



دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای پایاننامه کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد

رشد و مشخصه یابی لایه های نازک اکسید مولیبدن(MoO3)

نگارنده: مريم جلال

استاد راهنما :

دکتر حسین عشقی

تیر ۱۳۹۷

شمارہ: تاریخ:	باسمەتعالى	
		مديريت تحصيلات تكميلي

فرم شماره (۳) صورتجلسه نهایی دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

با نام و یاد خداوند متعال، ارزیابی جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم جلال با شماره دانشجویی ۹۴۳۷۵۶۴ رشته فیزیک گرایش حالت جامد تحت عنوان رشد و مشخصه یابی لایه های نازک اکسید مولیبدن(دMoO) که در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ حضور هیأت محترم داوران در دانشگاه صنعتی شاهرود بر گزار گردید به شرح ذیل اعلام می گردد:

		مردود 🗌	فبول (با درجه: على الله الله الله الله الله الله الله ال
		عملی 🗹	وع تحقيق: نظرى 🗌
امضاء	مرتبة علمى	نام ونام خانوادگی	عضو هيأت داوران
T	استاد	دكترحسين عشقى	۱_استادراهنمای اول
	8 0 ^{- 2}		۲- استادراهنمای دوم
			۳- استاد مشاور
Alien	استاديار	دکتر مهدی انصاری راد	۴– نماینده تحصیلات تکمیلی
3.1.	دانشيار	دکتر محمد مهدی باقری محمد مهدی باقری	۵- استاد ممتحن اول
e's	دانشيار	دكتر محمد ابراهيم قاضي	۶استاد ممتحن دوم

المرو نام خانوادگی رئیس دانشکده: تاريخ و امضاء و مهر دانشكده: 916

تبصره: در صورتی که کسی مردود شود حداکثر یکبار دیگر (در مدت مجاز تحصیل) می تواند از پایان نامه خود دفاع نماید (دفاع

مجدد نباید زودتر از ۴ ماه برگزار شود).

۵

۰۰۰۰ لفلر کم بہ ۰۰

ہمہ کسانی کہ دوستثنان دارم

حدوسپاس پرورد کار متعال راکد بار دیگر بریذه حقیر عنایت فرموده و در به سرانجام رسانیدن این پایان نامه، بهچون تامی مراحل زندگی یاری کرم بود. بی شک اکر لطف و کرم او نبود، این پایان نامه به سرانجام نمی رسید. اما در منیز انجام این کار، بعد از یاری پرورد کار، از کلک و رابهایی عزیزان زیادی بهروبرد م که در اینجابر خود و اجب می دانم فرصت را معتنم شمرده و باشایسته ترین احترامات تقدیر و امتان خالصانه و خاصانه خویش را نسبت به این بزرگوران ابراز مایم.

از اساد رامهای محترم خود، جناب آقای دکتر حسین عثقی که در محارش این پایان نامه از لطف و حایت ثان بسره مند بودم کال منگر را دارم . بهچنین از زحات جناب آقای مهندس عسکری، کارشاس

محترم آ زمایتگاه تحقیقاتی فنریک دانتگاه شاهرود که در طول دوران تحصیل برای اینجانب مشاوری این و دلسوز بوده کال تشکر و ساسکزاری را دارم .

تعهد نامه

اینجانب مریم جلال دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته فیزیک حالت جامد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود نویسنده پایان نامه رشد و مشخصه یابی لایه های نازک اکسید مولیبدن(MoO3) تحت راهنمایی دکتر حسین عشقی متعهد می شوم .

- تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است .
 - در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است .
- مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است .
- کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد و مقالات مستخرج با نام « دانشگاه صنعتی شاهرود
 » و یا

« Shahrood University of Technology » به چاپ خواهد رسید .

- حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایح اصلی پایان نامه تأثیرگذار بوده اند در مقالات مستخرج از پایان نامه رعایت می گردد.
- در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردی که از موجود زنده (یا بافتهای آنها) استفاده شده است ضوابط و اصول
 اخلاقی رعایت شده است .

در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که به حوزه اطلاعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است اصل رازداری ، ضوابط و اصول اخلاق انسانی رعایت شده است .

تاريخ

امضای دانشجو

مالکیت نتایج و حق نشر

 کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج ، کتاب ، برنامه های رایانه ای ، نرم افزار ها و تجه یزات ساخته شده است) متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد . این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود .

* این صفحه نیز باید در ابتدای نسخه های تکثیر شده پایان نامه وجود داشته باشد .

چکیدہ

در این تحقیق به سنتز و بررسی مورفولوژی سطح، خواص ساختاری، الکتریکی و نوری لایههای ناز ک اکسید مولیبدن (MoO₃) تهیه شده به روش اسپری پایرولیز بر روی زیرلایه شیشه پرداختیم. به منظور مشخصه یابی فیزیکی نمونه ها از دستگاههای میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف سنجی نوری (UV-Vis) و اندازه گیری جریان-ولتاژ (V-I) استفاده شد.

در مرحله نخست لایه های اکسید مولیبدن در آهنگ های لایه نشانی مختلف ۱/۵، ۲/۵ و ۵ ml/min فراهم شدند. معلوم شد که در مقایسه با دیگر نمونه ها، نمونه رشد یافته با آهنگ لایه نشانی ml/min ۵ از بلورینگی بهتری برخوردار است. به منظور بهبود این مشخصه به بررسی تاثیر دیگر شرایط رسوب گذاری شامل: اصلاح در روش اسپری (بخش ۴–۲–۱)، غلظت محلول (بخش ۴–۳) و سرانجام دمای زیرلایه (بخش ۴–۴) پرداختیم.

در این تحقیق دریافتیم تغییر در دمای زیرلایه به شرایط بهینه، از لحاظ بلورینگی، لایه اکسید مولیبدن منجر می شود.

کلمات کلیدی: اکسید مولیبدن (MoO₃)، اسپری پایرولیز، لایه نازک، نانو ساختار، مورفولوژی، خواص ساختاری، خواص نوری، خواص الکتریکی.

ليست مقالات مستخرج از پايان نامه :

جلال،مریم،عشقی،حسین(۱۳۹۶)، "بررسی تاثیر آهنگ لایه نشانی بر مورفولوژی، خواص ساختاری و اپتیکی لایههای نازک نانوساختار اکسید مولیبدن (MoO3) تهیه شده به روش اسپری پایرولیز"، بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران،۴۱۳–۴۱۶، دانشگاه شهرکرد.

	فهرست
ن و مرروی برمقالات۱	فصل اول:مقدمه ای برلایههای نازک اکسید مولیبدر
۲	۱-۱مقدمه ای بر نانو ساختار ها
۲	۱-۱-۱ اهمیت نانو ساختار ها
۲	۱-۱-۲ معرفی نانوساختارها
۵	۱-۲ لایههای نازک اکسید مولیبدن
یبدن تهیه شده به روش اسپری پایرولیز۶	۱–۳مروری بر مقالات در زمینه لایههای نازک اکسید مول
لیبدن تریاکسید به روش اسپری پایرولیز ۷	۱-۳-۱ بررسی اثر دمای زیر لایه بر خواص فیزیکی مو
ازک اکسید مولیبدن ۱۷	۱ – ۳–۲ بررسی اثر غلظت بر خواص فیزیکی لایههای ن
كسيد موليبدن	۱ – ۳-۳ بررسی اثرآلایش برخواص فیزیکی لایه نازک ا
، نازک اکسید مولیبدن ۲۵	فصل دوم: معرفی روش های مشخصه یابی لایه های
۲۶	۱-۲ مقدمه
۲۶(F)	۲-۲میکروسکوپ الکترون روبشی گسیل میدانی(E-SEM
۲۷	۲-۳پراش پرتو ایکس (XRD)
٣٠	۲-۴ طیف نگاری عبوری-جذبی
۳۰	الف)طيف عبوري
۳۱	ب) طیف جذبی
۳۱	ج) گاف نواری
۳۲	۲-۵ طیف سنجی رامان
۳۳	۲-۶ مشخصه یابی الکتریکی
نز لایه های نازک اکسید مولیبدن ۳۵	فصل سوم: جزئیات مراحل آزمایشگاهی رشد و سن
۳۶	۲-۱ مقدمه
۳۶	۲-۳ روش اسپری پایرولیز
۳۷	۳-۳ رشد و سنتز لایههای نازک اکسید مولیبدن
۳۷	۳-۳-۱ آماده سازی زیر لایه

۳۸	۳-۳-۲ تهیه محلول اولیه
۳۸	۳-۴ پارامترهای لایه نشانی
د مولیبدن۳۹	فصل چهارم: نتایج و بحث وابسته به سنتز لایه های نازک اکسی
۴۰	۴–۱ مقدمه
سيد موليبدن	۴-۲ بررسی تغییرات آهنگ لایه نشانی بر خواص فیزیکی لایه نازک اک
ی نازک اکسید مولیبدن۴۷	۴-۲-۱ بررسی تاثیر نحوه ی متفاوت اسپری بر خواص فیزیکی لایهها
يد موليبدن۵۵	۴-۳ بررسی تاثیر غلظت محلول بر خواص فیزیکی لایه های نازک اکس
د مولیبدن۶۳	۴-۴ بررسی تاثیردمای زیرلایه بر خواص فیزیکی لایه های نازک اکسید
۷۱	نتيجه گيري كلي
٧٢	پیشنهادات
۷۳	فهرست منابع

اشكال	فهرست	J
-------	-------	---

۳	ﻪ، b-انوسيم، c-نانولوله	ل ۱-۱: نمایش شکل های یک بعدی :a- نانومیل	شكإ
ل از چند لایه نازک در	تصوير ميكروسكوپ الكتروني	ل ۱-۲: طرح شماتیک لایه های نازک در بالا و ز	شكإ
۳		ن	پايي
۴		ل۱-۳: نانو صفحات و نانو ورق	شكإ
۵		ل۱-۴: ساختار بلوری MoO3 ،فاز β۰αد است	شكر
۶	تت	ل١–٥: تصوير پودر آمونيوم موليبدات تترا هيدرا،	شكإ
۵	ن در دماهای متفاوت زیرلای	ل۱-۶: طیف رامان لایههای نازک اکسید مولیبد	شكإ
اوت زيرلايه٨	سيد موليبدن دردماهاي متف	ل ۱-۷: الگوهای پراش پرتوX لایههای نازک اکس	شكإ
دماهای متفاوت زیرلایه میسیسیسی	`یههای اکسید مولیبدن در ۱ 	ل۱–۸: نمودار تغییرات اندازه بلورک و ضخامت لا	شکا
۱۰	ببدن در دماهای مختلف	ل۱-۹: تصاویر SEM لایه های نازک اکسید مول	شکا
11	لیبدن در دماهای مختلف	ل ۱-۱۰: تصاویر SEM لایه های نازک اکسید مو	شكإ
`یه متفاوت۱۱	ید مولیبدن در دماهای زیرلا	ل۱-۱۱: طیف عبور اپتیکی لایه های نازک اکسب	شكإ
ماهاي زيرلايه متفاوت	، نازک اکسید مولیبدن در د	ل۱-۱۲: تغییرات α برحسب طول موج لایههای	شكإ
۱۲			•••••
ماهای زیرلایه متفاوت. ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نازک اکسید مولیبدن در د	ل۱–۱۳:تغییرات ² (αhv) بر حسب hv لایههای	شک
ک اکسید مولیبدن در	عکس دما برای لایههای ناز	ل ۱-۱۴: تغییرات رسانش الکتریکی بر حسب	شکړ
۱۴		های زیرلایه متفاوت	دماه
نفاوت زيرلايه ۱۵	کسید مولیبدن دردماهای من	ل۱۵–۱۵:الگوی پراش پرتوXRD لایههای نازک ا	شكإ
رلايه	یبدن در دماهای مختلف زی	ل۱-۱۶:تصاویر SEM لایه های نازک اکسید مول	شكإ
عتلف محلول ۱۸	، مولیبدن در غلظتهای مخ	ل ۱–۱۷: الگوهای پراش پرتو X لایه های اکسید	شكإ
للول٩	ن در غلظتهای مختلف مح	ل ۱–۱۸: تصاویر AFM لایه های اکسید مولیبد	شكإ
۲۰	ﻪﮬﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ	ل ۱–۱۹: الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) نمون	شكإ
۲۱		ل ۱-۲۰: طيف رامان نمونه خالص مورد بررسی	شکا

۲۲	شکل ۱–۲۱: نمودار طیف سنجی فوتوالکترونی اشعه ایکس (XPS)
۲۲	شکل ۱-۲۲: تصویر SEM لایه نازک اکسید مولیبدن
۲۳	شکل ۱-۲۳: الف) طیف عبور و (ب) طیف بازتاب نمونههای مورد بررسی
۲۳	شکلh-۲۴-۱ تغییرات ² (αhv) بر حسب hv نمونه های مورد بررسی
حوارهای از اجزاء اصلی	شکل ۲-۱: (الف) نمایی از میکروسکوپ الکترونی روبشی اثر میدانی. (ب) طر
۲۷	یک میکروسکوپ الکترونی روبشی
۲۸	شکل۲-۲: یک طرحواره از نحوه پراش پرتو x از صفحات بلوری
۲۸	شکل ۲-۳ : تصویری از دستگاه پراش پرتو X
SI مستقر در آزمایشگاه	شکل ۲-۴: الف) نمایی از دستگاه اسپکتروفوتومتر مدل -Himadzu UV1800
۳۱	نانوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
ه صنعتی شاهرود ۳۳	شکل ۲-۵: دستگاه طیف سنجی رامان موجود در آزمایشگاه نانو فیزیک دانشگا
د جهت تعيين مشخصه	شـکل ۲-۶: دسـتگاه آنالیز الکتروشیمیایی مدل PGS2065 در دانشگاه شاهرو
۳۳	I-V نمونهها
Sp) موجود در دانشگاه	شکل۳-۱: (الف) دستگاه اسپری پایرولیز (ray Coating System.S.C.S.86
۳۷	صنعتی شاهرود، (ب) طرح واره ای از دستگاه اسپری پایرولیز
اسپری مختلف از بالا و	شکل۴–۱: تصاویرFE-SEM نمونههای مورد بررسی تهیه شده در آهنگ های
۴۱	مقطع عرضي
۴۲	شکل۴-۲: طیف XRD نمونههای R1، R2 و R3
۴۴	شکل ۴-۳: تصویر رامان نمونه های R1، R2 و R3
۴۵R3	شکل ۴-۴: طیفهای (الف)عبور و(ب) جذب اپتیکی در نمونه های R1 و
داده شده به ازای آهنگ	شکل ۴–۵: (a,b, c)تغییرات ٔ (αh υ) برحسب انرژی فوتون ها در لایه های رشد
رشد در نمونههای مورد ۴۶	های اسپری مختلف. و (d) تغییرات گاف نواری و اندازه بلورک بر حسب نرخ بررسی
Rو 3'RR	شکل۴–۶: تصاویر FE-SEM نمونههای مورد بررسی با تغییر در شیوه اسیری3
۴۹R	شکل۴-۲: طیف XRD نمونههای مورد بررسی با تغییر در شیوه اسیریR3و 3
و 8'R	شکل۴–۸: تصویر رامان در نمونه های مورد بررسی با تغییر در شیوه اسپریR3

۵۲	شکل۴–۹: نمودار I-V نمونههای مورد بررسی با تغییر در شیوه اسپریR3 ۶ S3
شيوه	شکل ۴–۱۰: طیفهای (الف)عبور و(ب) جذب اپتیکی در لایههای مورد بررسی با تغییر در
۵۳	اسپرىR3و 3'R
شيوه	شکل۴–۱۱: تغییرات ² (ahu) بر حسب انرژی فوتونها در نمونههای مورد بررسی با تغییر در
۵۳	اسپرىR3و 3`R
۵۶	شکل۴–۱۲: تصاویر FE-SEM نمونه های M1٬ M1 و M3
۵۷	شکل۴–۱۳:طیف XRD نمونههای M1، M2 وM3
۵۹	شکل۴–۱۴: تصویر رامان نمونه های M2 ،M1 و M3
عسب	شکل۴–۱۵: (الف) نمودار I-V نمونههای مورد بررسی.(ب) نمودار تغییرات مقاومت الکتریکی بر ح
۶۰	تغييرات غلظت محلول اسپری
۶۱	شکل ۴-۱۶: طیفهای (الف)عبور و(ب) جذب اپتیکی در لایههای مورد بررسی
يرات	شکل۴–۱۷: (الف)تغییرات ² (ahu) بر حسب انرژی فوتون ها در نمونههای مورد بررسی.(ب) تغی
۶۲	گاف نواری و مقاومت الکتریکی بر حسب غلظت محلول
۶۳	شکل۴-۱۸: تصاویر FE-SEM نمونههای مورد بررسی در نمونه های T1، T3و T3
۶۴	شکل۴–۱۹:طیف XRD نمونههای مورد بررسی در نمونه های T1٬ T3و T3
۶۷	شکل۴-۲۰: تصویر رامان در نمونههای مورد بررسی در نمونه های T1، T2و T3
يرات	شکل۴–۲۱: (الف) مشخصه I-V نمونههای مورد بررسی در نمونه های T1، T2و T3 (ب) نمودار تغی
۶۸	مقاومت الكتريكي بر حسب تغييرات دماي زير لايه
۶٩	شکل ۴-۲۲: طیفهای (الف)عبور و(ب) جذب اپتیکی در نمونه های T1، T3و T3
γ۰	شکل۴–۲۲: تغییرات²(ahu) بر حسب انرژی فوتونها در نمونههای نمونه های T1، T2و T3،

فهرست جداول

۶	جدول۱–۱: برخی ویژگیهای اکسید مولیبدن
۹	جدول ۱-۲: تغییرات حجم یاخته،ثابتهای شبکه و ضریب بافت بر حسب تغییرات دمای زیرلایه
۲.	جدول۱–۳: اندازه بلورک، میکروکرنش و چگالی دررفتگی نمونههای مورد بررسی
24	جدول ۱–۴: گاف نواری نمونه های مورد بررسی
47	جدول۴-۱: اندازه بلورکها، تراکم دررفتگیها و میکروکرنشهای بلوری برای قله ترجیحی (۰۲۰)
47	جدول۴-۲: اندازه بلورکها، تراکم دررفتگیها و میکروکرنشهای بلوری برای قله (۴۴۰)
47	جدول۴–۳: اندازه بلورکها، تراکم دررفتگیها و میکروکرنشهای بلوری برای قله (۰۶۰)
47	جدول ۴-۴: ضریب بافت برای قلههای اصلی (۲۲۰)،(۲۴۰) و(۰۶۰)
49	جدول۴–۵: اندازه بلورکها، تراکم دررفتگیها و میکروکرنشهای بلوری برای قله ترجیحی(۲۰)
۵۰	جدول۴-۶: اندازه بلور کها،تراکم دررفتگیها و میکرونشهای بلوری برای قله (۰۴۰)
۵۰	جدول۴-۷: اندازه بلور کها،تراکم دررفتگیها و میکروکرنشهای بلوری برای قله (۰۶۰)
۵۰	جدول۴–۸: ضریب بافت برای قلههای(۰۲۰)، (۰۴۰) و (۰۶۰)
۵۷	جدول۴-۹: اندازه بلورکها،تراکم دررفتگیها و میکروکرنشهای بلوری برای قله ترجیحی (۲۰۰)
۵۸	جدول۴–۱۰: اندازه بلور کها،تراکم دررفتگیها و میکروکرنشهای بلوری برای قله (۰۴۰)
۵۸	جدول۴–۱۱: اندازه بلورکها،تراکم دررفتگیها و میکروکرنشهای بلوری برای قله (۰۶۰)
۵۸	جدول۴–۱۲ : ضریب بافت برای قلههای پراش (۲۰۰)، (۰۴۰) و (۰۶۰). سیسیسیسیسی
۶۵	جدول۴-۱۳: اندازه بلورکها،تراکم دررفتگیها و میکروکرنشهای بلوری برای قله ترجیحی (۰۲۰).
۶۵	جدول۴-۱۴: اندازه بلورکها،تراکم دررفتگیها و میکروکرنشهای بلوری برای قله (۰۴۰)
۶۵	جدول۴–۱۵: اندازه بلورکها،تراکم دررفتگیها و میکروکرنشهای بلوری برای قله (۰۶۰)
66	جدول۴-۱۶ : ضریب بافت برای سه قله اصلی(۲۰۰)، (۰۴۰) و (۰۶۰)

فصل اول مقدمه ای بر لایه های نازک اکسید مولیبدن و مروری برمقالات

۱–۱مقدمه ای بر نانو ساختار ها

۱–۱–۱ اهمیت نانو ساختار ها

دیدگاههای ریچارد فاینمن، فیزیکدان برنده جایزه نوبل سال ۱۹۶۵، نقش به سزایی در پیریزی علوم نانو داشته است به طوری که امروزه نام نانو بسیار شنیده می شود و دلایل بسیاری برای اهمیت علم و فناوری نانو وجود دارد. از جمله مهمترین آنها تغییر خواص مواد مانند هدایت الکتریکی، رنگ، استحکام مکانیکی و حتی وزن در مقیاس نانو نسبت به حالت بزرگ مقیاس آن است، به عنوان مثال خاصیت رسانایی فلزات کاملا شناخته شده است. با این حال فلزات می توانند در مقیاس نانو نیم رسانا و یا حتی عایق شوند[۱].

با این تعاریف نانو نه تنها به معنای هزار برابر کوچکتر از میکرو و در امتداد فناوری میکرو به یک مقیاس کوچکتر بوده بلکه فناوری نانو یک الگوی کاملا جدید است که فرصتهای بسیاری را برای علم و فناوری مهیا میکند.[۱].

1-1-7 معرفي نانوساختارها

پایه اصلی نانوتکنولوژی بر استفاده از مواد است. هر ماده ای در فضا دارای سه بعد طول، عرض و ارتفاع است. اگر در ماده ای حداقل یکی از این سه بعد در محدوده ۱۰۰nm یا کوچکتر باشد به آن ماده نانوساختار گویند. بر این اساس مواد به چهار دسته تقسیم میشوند[۲].

الف) نانو مواد صفر بعدی : نانو مواد صفر بعدی شامل نانو ذرات می شوند که تجمعی از واحدهای سازنده (اتم و یا مولکول) با اندازهای بین ۱ تا ۱۰۰۳۳ می شود [۳].

ب)نانو مواد یک بعدی: نانومواد تک بعدی دارای دو بعد در مقیاس نانو و یک بعد آزاد می باشند. نانوساختارهای یک بعدی بسته پارامترهایی مثل شکل سطح مقطع و نسبت ابعادی به سه دسته تقسیم می شوند اگر همانند شکل۱–۱، نسبت ابعادی کوچک باشد به آن نانومیله^۱ گویند و اگر این نسبت ابعادی بزرگ باشد به آن نانوسیم^۲ و در آخر اگر ساختار توخالی باشد به آن نانولوله^۳ گویند[۴–۶].



شکل ۱-۱: نمایش شکل های یک بعدی :a- نانومیله، b-انوسیم، -c-نانولوله [۶-۶]

پ)نانو مواد دو بعدی : این مواد دارای دوبعد آزاد و یک بعد در مقیاس نانو میباشند حالت معروف تر این دسته، لایههای نازک^۴ است. طرح شماتیک وتصویر میکروسکوپ الکترونی (تصویر از مقطع لایه های نازک) در شکل۱–۲ نشان داده شده است. لایه نازک بر روی سطح یک ماده دیگر به نام زیرلایه^۵ به شکل یک لایه قرار می گیرد. لایههای نازک کاربردهای فراوانی در حوزههای مختلف دارند. برای مثال در ساخت ادوات الکترونیکی و اپتیکی به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند[۴-۶].



شکل ۱-۲: طرح شماتیک لایه های نازک در بالا و تصویر میکروسکوپ الکترونی از چند لایه نازک در پایین.[۴-۶]

- ³Nanotube
- ⁴ Thin-film
- ⁵ Substrate

¹ Nanorod

² Nanowire

دسته دیگر مواد دو بعدی که در مقایسه با لایههای نازک اهمیت کمتری دارند آنهایی هستند که مستقل از یک زیرلایه اند. شکل ۱–۳ دو نمونه تصاویر آنها را نشان میدهد. از این گروه می توانیم نانو صفحهها ^۱ و نانو ورق ها ^۲ را نام برد. نانوصفحه ها غالبا از نانو ورقها ضخامت بیشتری دارند [۴–۶].



شكل ١-٣: نانو صفحات و نانو ورق. [۴-۶].

ت) نانوساختارهای سه بعدی: در این دسته هر سه بعد آنها در مقیاس آزاد است. همان طور که مشاهده می کنید این تعریف با تعریف مواد نانوساختار در تناقض است زیرا هیچ یک از سه بعد آن در مقیاس نانو نیست اما برای توضیح بیشتر به معرفی ماده کپه-ای (منظور از کپه ای ماده توده ای یعنی ابعاد میکرون و بزرگ تر می باشد) قابل دیدن است ولی ساختارش به نوعی با نانو مرتبط است و این تفاوت آن با مواد کپه ای غیر نانویی است ما این موارد جدید را مواد نانوساختار کپه ای، مواد سه بعدی نانوساختار می نامیم. به طور مثال در مواد مزومتخلخل ابعاد ماده غالبا خیلی بزرگ تر از نانو است ولی دارای تخلخل های در محدوده نانو است [۴-۶].

¹ Nanoplate

² Nanosheet

۲-۱ لایههای نازک اکسید مولیبدن

MoO₃ یک نیمرسانا از اکسید فلزات واسطه است[۷]. این ترکیب به روشهای مختلف از جمله روش اسپری پایرولیز[۷-۹]، کندوپاش[۱۰]، رسوب گذاری لیزر پالسی[۱۱]، سل- ژل[۱۲] ، و رسوب گذاری بخار شیمیایی تهیه می شود[۱۳].

در برخی از این مقالات که به نوع رسانندگی الکتریکی لایه ها اشاره گردیده این ماده در شرایط خالص عمدتا به دلیل وجود تهی جاهای اکسیژن در شبکه بلوری از رسانندگی الکتریکی نوع n برخوردار است[۷]. گاف نواری مستقیم در لایه های نازک این ماده در گستره ۳/۹۲۴ تا ۳/۹۲eV گزارش شده است[۸].

MoO₃ بلوری سه فاز چند ریختی^۱ دارد شکل (۱-۴): فاز پایدار ترمودینامیکی راست گوشه^۲ (αMoO₃) و دوفازشبه پایدار تک میلی^۳ (β-MoO₃) و شش گوشی^۴ (h-MoO₃). پایداری فاز و ساختار بلوری MoO₃ توسط موقعیت هشت وجهی MoO₆ به عنوان واحد سازنده ی اصلی آن مشخص میشود. در MoO₆ اتم مولیبدن با شش اتم اکسیژن به شکل هشت وجهی MoO₆ همسایه است. [۱۴]



 α -MoO₃ (orthorhombic, *Pbnm*)

a=0.397, *b*=1.388, *c*=0.370nm

 β -MoO₃ (monoclinic, P2₁/c)

a=0.712, b=0.537, c=0.557nm



h-MoO₃ (hexagonal, $P6_3/m$) a=1.053, c=1.497nm

C

شكل ۱-۴: ساختار بلورى MoO3 ،فاز β،αوh [۱۴].

¹ Polymorphism

² Orthorhombic

³ Monmelinie

⁴ Hexagonal

اکسید مولیبدن قابلیتهای زیادی درکاربردهای صنعتی دارد که می توان به مواردی از جمله: حسگر های گازی[۸]و پنجره های هوشمند[۱۵] اشاره کرد.

در جدول ۱-۱ به برخی ویژگیهای اکسید مولیبدن اشاره شده است.

مقدار	خاصيت
MoO ₃	فرمول مولكولى
۱۴۳/۹۴ g mol^{-1}	جرم مولی
جامد به رنگ زرد یا آبی روشن	شکل و حالت فیزیکی
۴/۶۹ g/cm ³	چگالی
۷۹۵ ⁰ C	دمای ذوب
1166 °C	نقطه جوش
راستگوش	ساختار بلورى
نوع n	نوع رسانندگی

جدول ۱-۱: برخی ویژگیهای اکسید مولیبدن.[۱۶]



شكل١-٥: تصوير پودر آمونيوم موليبدات تترا هيدرات

۱–۳مروری بر مقالات در زمینه لایههای نازک اکسید مولیبدن تهیه شده به روش
 ۱سپری پایرولیز

لایههای نازک اکسید مولیبدن با پارامترهای متفاوت به روش اسپری پایرولیز تهیه شده و مورد بررسی گرفتهاند. در ادامه به بیان نتایج برخی تحقیقات صورت گرفته توسط محققین خواهیم پرداخت. ۱–۳–۱ بررسی اثر دماهای زیر لایه بر خواص فیزیکی مولیبدن تری اکسید با روش اسپری پایرولیز

الف) مارتینز^۱ و همکاران[۱۷] لایههای نازک اکسید مولیبدن که به روش اسپری پایرولیز تهیه شدهاند را مورد بررسی قرار دادند. محلول مورد استفاده شامل پودر آمونیوم مولیبدات تترا هیدرات (NH4)6M07O244H2O) محلول در آب مقطر ۱۸ /۱۰ میباشد که با فشار هوای ۴/۹×۱۰^۴ بر روی زیرلایه شیشه با فاصله افشانه ۳۰cm لایه نشانی شدند. در این تحقیق نمونهها در دماهای زیرلایه متفاوت در بازه ۶۷۳K–۴۲۳ فراهم شدند و از ویژگیهای زیر برخوردار هستند:

شـکل۱-۶ طیف رامان نمونههای مورد بررسـی را نشان میدهد. در این طیف قله های واقع در موقعیـتهـای ۶۶۷، ۸۱۹ و^{۱-}۹۹۵cm و سـایر قلـههـا مربوط مربوط بـه فـاز α-MoO₃ (فـاز راستگوشه)هستند[۱۹–۱۹].



شکل۱-۶: طیف رامان لایههای نازک اکسید مولیبدن در دماهای متفاوت زیرلایه.[۱۷]

¹ H.Martines et al

شکل ۱–۷، الگوی پراش پرتوی ایکس (XRD) نمونههای مورد بررسی را نشان میدهد. در تمام الگوهای پراش ساختار بسبلوری مشاهده میشود. صفحات (۲۰۰)، (۴۰۰)و (۴۰۰) مربوط به ساختار راست گوشه در تمامی نمونهها دیده میشود. در الگوی پراش پرتو X در دماهای ۴۷۳، ۵۲۳ و ۵۷۳K تعدادی قله وجود دارد که با افزایش دما تا دمای ۶۷۳K–۶۲۳ از تعداد قلهها کاسته و بر شدت آنها افزوده میشود. بطورکلی با افزایش دما تعداد قلهها کاهش و شدت آنها افزایش یافته و ساختار بلوری آنها بهبود پیدا کرده است[۱۷].



شکل ۱–۷: الگوهای پراش پرتوX لایههای نازک اکسید مولیبدن دردماهای متفاوت زیرلایه.[۱9]

همانطور که در جدول ۱-۲ مشاهده می شود با افزایش دمای زیرلایه، حجم سلول کاهش یافته که نشان دهنده بهبود ساختار بلوری لایه است.

Ts (K)	a (Å)	b (Å)	c (Å)	Volume (Å ³)	Tc (nm)
473	3.922	13.811	3.878	210.06	17.03
523	3.944	13.778	3.782	205.52	18.28
573	3.945	13.812	3.783	205.37	17.08
623	3.959	13.724	3.738	203.37	31.08
673	3.984	13.778	3.667	201.28	43.81
	3.962	13.858	3.697	202.99	Card no. 00-005-0508
573	3.973	13.902	3.692	203.92	Bouzidi [3]

جدول ۱-۲: تغییرات حجم یاخته،ثابتهای شبکه و ضریب بافت بر حسب تغییرات دمای زیرلایه[۱۷].

شکل ۱-۸ نمودار تغییر اندازه بلورک و ضخامت بر حسب تغییرات دمای زیرلایه برای نمونههای مورد بررسی رانشان میدهد. اندازه بلورکها از دمای ۴۲۳K تا ۵۷۳K در حدود ۱۸nm ثابت میماند و از دمای ۵۷۳K تا ۶۷۳K به ۴۰nm میرسد. ضخامت نمونهها از ۲۳ K تا ۵۷۳K افزایش یافته و از دمای ۵۷۳K تا ۶۷۳K کاهش مییابد. این تغییرات میتواند ناشی از این باشد که دردماهای بالا مقدار ماده ای که به زیرلایه میرسد مجددا تبخیر شده و لایه ای نازکتر را ایجاد میکند. از طرفی افزایش اندازه بلورک و کاهش ضخامت نشان میدهد که اندازه بلورکها میتواند نشاتگر این باشد که با افزایش



شکل۱-۸:نمودار تغییرات اندازه بلورک و ضخامت لایه های اکسید مولیبدن در دماهای متفاوت زیرلایه.[۱۷]

شکل ۱–۹ و ۱–۱۰، تصاویر SEM نمونههای مورد بررسی را نشان میدهند. بر اساس تصاویر در دماهای پایین زیرلایه سطوح صاف و منظم و ساختار لایهای درنمونهها را میبینیم. بر اساس تصاویر در دمای پایین تر از ۴۲۳ دانههایی با قطر بسیار کوچک دیده میشود به طوری که هیچ مرز مشخصی بین آنها دیده نمی شود. در دمای بین ۶۲۳K –۴۷۳ اندازه بلور کها ثابت و دارای مرز مشتر ک هستند. در دمای X۳۳ دانهها دارای اشکال مختلف هستند و مرزمشتر کی ندارند[۱۷].



شکل۱-۹: تصاویر SEM لایه های نازک اکسید مولیبدن در دماهای مختلف.[۱۷]

نمونه تهیه شده در دمای ۴۲۳ K نشان دهنده تشکیل زنجیره هایی بر روی سطح ماده است که به صورت حلقه های متصل به هم با عرض ۸۵µ۳ می باشد که با افزایش دما تراکم زنجیره ها افزایش یافته و شکل دایره ای خود را از دست می دهند و در دماهای بالا شروع به ناپدید شدن می کنند. علت تشکیل زنجیره ها به جوش رسیدن آمونیوم مولیبدات در حین رسیدن به سطح زیرلایه می باشد. در دماهای بالا به دلیل سریع بودن فرآیند تبخیر جا به جایی قطره ها کمتر شده و زنجیره ها شروع به ناپدید شدن می کنند[۱۷].



شکل۱-۱۰: تصاویر SEM لایه های نازک اکسید مولیبدن در دماهای مختلف.[۱۷]

شکل ۱–۱۱ طیف عبور اپتیکی نمونههای مورد بررسی را نشان میدهد. همانطور که مشاهده می شود با افزایش دما از ۴۲۳K به ۶۷۳K میزان عبور کاهش می یابد[۱۷].



شکل۱-۱۱: طیف عبور اپتیکی لایه های نازک اکسید مولیبدن در دماهای زیرلایه متفاوت.[۱۷]

شـکل ۱-۱۲ طیـف ضـریب جـذب نمونـه هـای مـورد بررسـی را نشـان مـیدهـد. همـانطـور کـه مشـاهده مـیشـود درمنـاطق جـذب بـالا مقـدار^{1-۱۰۴} بـه دسـت مـی-آیـد کـه مربـوط بـه انتقـال نـوار بـه نـوار در مـاده اسـت. منـاطق جـذب پـایین در نمونـه هـا در طـول مـوجهـای بزرگتـر از ۳m ۴۰۰ دیـده مـیشـود کـه مـیتوانـد مربـوط بـه تهـی جاهای اکسیژن در ماده باشد[۱۷].



شکل ۱–۱۲:تغییرات lpha برحسب طول موج لایه های نازک اکسید مولیبدن در دماهای زیرلایه متفاوت [۱۷]

شکل(۱–۱۳) طیف تغییرات²(αhv) بر حسب طول موج دردماهای زیرلایه متفاوت را نشان می-دهد. با افزایش دما از ۴۲۳تا ۶۷۳K میزان گاف نواری کاهش می یاید[۱۷].



شکل۱-۱۳:تغییرات $^{(lpha hv)}$ بر حسب hv لایههای نازک اکسید مولیبدن در دماهای زیرلایه متفاوت. [۱۷]

در انـدازه گیـریهـای انجـام شـده بـرای مقـدار رسـانندگی الکتریکـی DC نمونـههـا در محـدوده ولتـاژ ۱۰۷- تـا ۱۰۷+ رفتـار اهمـی مشـاهده شـده اسـت. نمونـه تهیـه شـده در دمـای ۴۷۳K مقـدار رسانشـی در حـدود ^{1-Ω۱۰-۱۲} را دارا اسـت امـا در نمونـه تهیـه شـده در در دمـای ۵۷۳K مقـدار رسـانش در حـدود دو مرتبـه بزرگـی افـزایش پیـدا کرده است[۱۷].

شــکل ۱-۱۴ تغییـرات رسـانش الکتریکـی برحسـب تغییـرات دمـا را نشـان مـی-دهـد. مشـاهده مـیشـود کـه رسـانش بـا افـزایش دمـای زیرلایـه افـزایش یافتـه اسـت. ایـن تغییـرات نشـان مـیدهـد کـه رسـانش ناشـی از گـذار نـوار بـه نـوار یـا رسـانش ذاتـی در دماهای بالا و جهش^۱ در دماهای پایین وابسته به ترازهای منتسب به تهی جاهای اکسیژن باشد[۱۷].



شکل ۱-۱۴: تغییرات رسانش الکتریکی بر حسب عکس دما برای لایههای نازک اکسید مولیبدن در دماهای زیرلایه متفاوت.[۱۷]

به طور کلی می توان نتیجه گرفت که لایههای نازک اکسید مولیبدن با کیفیت خوبی با استفاده از ماده آمونیوم هپتا مولیبدات تترا هیدرات با روش اسپری از دمای ۴۲۳K تا۶۷۳K تهیه شدند. نمونه تهیه شده در دمای ۶۷۳K دارای بهترین بلورینگی بوده است. با افزایش دمای زیرلایه مقدار گاف نواری از ۷/۶۲eV به مقدار ۳/۴۰eV کاهش یافته است. این تغییرات در مقدار گاف نواری را می توان به افزایش تعداد تهی جاهای اکسیژن نسبت داد[۱۷].

ب) مارتینز و همکاران[۲۰] لایههای نازک اکسید مولیبدن را که به روش اسپری پایرولیز که در
 دماهای زیرلایه متفاوت تهیه شده اند، مورد بررسی قرار داده اند. محلول مورد استفاده برای تهیه
 لایههای نازک اکسید مولیبدن Δ_MoO_3 آمونیوم مولیبدات تترا هیدرات (NH4)6M07O244H2O))

¹ Hopping

محلول در آب مقطر(۰/۱M) میباشد لایه نشانی شدند. در این تحقیق دمای رشد نمونهها در بازه ۴۲۳-۶۷۳K فراهم شدند و از ویژگیهای زیر برخوردار هستند:

شکل۱–۱۵، الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) نمونههای مورد بررسی را نشان میدهد. در این نمونهها حضور دو فاز بلورین متفاوت مشاهده شده است: ΜοΟ_Δ (فاز راست گوشه) و MoO_Δ (فاز ۱۵nm تکمیلی). با توجه به موقعیت قلهها در تمام لایهها هر دو فاز مشاهده می شوند. اندازه ذرات از در دمای ۴۲۰K به ۱۱۰nm در دمای ۶۷۳K می رسد که این مقادیر وابسته به پهنای نیمه بیشینه در طیف پراش پرتو ایکس می باشد[۲۰].



شکل۱-۵۵:الگوی پراش پرتوXRD لایههای نازک اکسید مولیبدن دردماهای متفاوت زیرلایه.[۲۰]

شــکل۱-۱۶، تصـاویر SEM نمونــههـای مــورد بررســی را نشـان مــیدهــد. در تصاویر بافـت اسـفنجی شـکلی دیـده مـیشـود کـه ظـاهرا بـا منافـذ عمیـق رشـد کـرده انـد. قطـر مقطـع عرضـی آنهـا بـین ۱۰۰۳m تـا ۱۰۰μ۳ تخمـین زده مـیشـود. بـا افـزایش دما بین ۴۷۳K تا ۶۲۳K حفرههای عمیقی روی سطح لایه شکل می گیرند که ۷۰٪ میانگین قطر آنها بین ۱۰۰۵–۴۰ است. با افزایش دما بین ۴۷۰ تا ۵۷۰K اندازه این حفرهها بزرگتر میشود. همچنین وجود ساختارهایی با ابعاد ۱۰۰۳m -۵۰ درون این حفرههای عمیق دیده میشود[۲۰].



شکل ۱-۱۶: تصاویر SEM لایه های نازک اکسید مولیبدن در دماهای مختلف زیرلایه. [۲۰]

بدین ترتیب مشاهده شده که دراین نمونه ها طیف پراش پرتو ایکس وجود فازهای α وβ این لایه را تایید میکند و ترکیب نسبی فازهای بلوری وابسته به تغییرات دمای زیرلایه است. نمونه تهیه شده در دمای زیرلایه ۶۷۰K دارای ساختار راستگوشه است در حالی که نمونه تهیه شده در دمای ۲۰۲K دارای فاز تــکمیلــی مــیباشـد. تصـاویر SEM سـاختار اسـفنجی متخلخـل و تشـکیل سـاختار های در ابعاد نانو را نشان میدهند[۲۰].

۱- ۳-۲ بررسیی اثر غلظت بر خواص فیزیکی لاییه های نازک اکسید مولیبدن

ماهاجان و همکاران [۲۱] لایسهای ناز کاکسید مولیبدن را به روش اسپری پایرولیز تهیه ومورد بررسی قرارداده اند. محلول مورد استفاده برای تهیه لایههای ناز کاکسید مولیبدن، پودر MoO3محلول در آمونیا کامیباشد که در سه غلظت ۵،۱۰ و MM ۱۵ تهیه شده اند. این محلولها بر روی زیرلایه شیشه به منظور بررسی خواص ساختاری و اپتیکی و بر روی FTO به منظور بررسی خواص الکتروکرومیک نمونها لایهنشانی شدند. در این تحقیق نمونهها در غلظتهای مختلف محلول MMM و ۱۰، ۵ (بترتیب نمونههای 21، 22 و 23) فراهم شدند.

شــکل۱–۱۷ الگـوی پـراش پرتـو ایکـس (XRD) نمونـههـای مـورد بررسـی را نشـان مـیدهـد. در الگـوی پـراش پرتـو X در تمـامی لایـههـا صـفحات بلـوری (۲۰۰)، (۰۴۰) ، (۰۶۰) و (۰۲۱) دیـده شـدهانـد . انـدازه بلـورکهـا بـا توجـه بـه معادلـه شـرر بـه ترتيـب بـرای نمونـههـای C1، C2 و ۴۷،۴۵:C3 و ۴۸،۴۵ بدسـت آمـده انـد. دیـده مـیشـود کـه بلـورینگی لایـههـا بـا افـزایش غلظـت بـه دلیـل افـزایش در انـدازه بلـورک افزایش مییابد[۲۱].

¹ S.Mahajan et al



شکل ۱–۱۷: الگوهای پراش پرتو X لایه های اکسید مولیبدن در غلظتهای مختلف محلول.[۲۱] شـکل ۱–۱۸، تصـاویر AFM نمونـههای مـورد بررسـی را نشـان مـیدهـد. همـان طـور کـه مشـاهده مـیشـود بـا افـزایش غلظـت انـدازه دانـه افـزایش مـییابـد. متوسـط انـدازه دانـهها بـرای نمونـههای ۲۵، ۲۵ و ۲۵ بـه ترتیـب ۴۵۰nm -۰۰۳، ۵۰۰۳ دانـهها بـرای نمونـه ۲۵ دیـده مـیشـود. در نمونـه ۲۵ دانـههای مسـطح مسـتطیلی بصورت ردیـف در بلـور ، در جهـتگیـری (1 ا 2 0) لایـه-های اکسید مولیبدن قرار گرفتند[۲۱].



شکل ۱-۱۸: تصاویر AFM لایه های اکسید مولیبدن در غلظتهای مختلف محلول.[۲۱] بدین ترتیب لایههای نازک اکسید مولیبدن در غلظتهای ۵، ۱۰ و ۱۵Mm با اندازه بلورکهای ۴۵، ۴۷ و ۴۵nm تهیه شدند. خود تجمعی با مورفولوژی AFM تایید شد[۲۱]. ۱- ۳-۳ بررسی اثر آلایش برخواص فیزیکی لایه نازک اکسید مولیبدن

کامون^۱ و همکاران [۲۴] لایههای نازک اکسید مولیبدن خالص و آلاییده با یوروپیم (Eu) را به روش اسپری پایرولیز تهیه و مورد بررسی قرارداده اند. محلول مورد استفاده برای تهیه لایههای نازک اکسید مولیبدن آمونیوم مولیبدات تترا هیدرات (NH4)6M07O244H2O)) محلول در آب مقطر(M ۱۰/۰۱) بوده که نمونهها برروی زیرلایه شیشه تهیه شدند. یوروپیوم اکساید (EuO3) در محیط اسیدی حل شده و به عنوان منبع یوروپیم (Eu) به محلول آمونیوم مولیبدات تترا هیدرات اضافه شده است. نسبت مولی Eu به Mo برای تهیه نمونههای آلاییده ۵/۰، ۱، ۱/۵ و ۲٪ می باشد.

¹ O Kamoun et al

شکل ۱–۱۹، الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) نمونههای مورد بررسی را نشان میدهد. الگوی پراش در نمونه بدون آلایش قلههای (۰۲۰)، (۰۴۰) و (۰۶۰) مربوط به ساختار راست گوشه مطابق با کارت (JCPDS n:76-1003) را نشان میدهد.



شکل ۱-۱۹: الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) نمونههای مورد بررسی [۲۴].

اندازه بلورکها، چگالی دررفتگیها و میکرو کرنشهای بلوری درجدول ۱-۳ نشان داده شده اند. همانطور که مشاهده میشود اندازه بلورکها از ۷۴nm تا ۸۵nm تغییر کرده است. همچنین مقادیر محاسبه شده برای میکروکرنشها و چگالی دررفتگیها نشان دهنده وابستگی این کمیت ها به آلایش میباشد.

	D (nm)	ξ (10 ⁻⁴)	$\delta_{\rm dis}$ (10 ¹⁴ lines /m ²)
MoO ₃	84.40	12.9	1.55
MoO ₃ : Eu 0.5%	85.13	11.3	1.76
MoO3: Eu 1%	74.06	13.6	2.36
MoO ₃ : Eu 1.5%	75.11	13.4	2.12
MoO3: Eu 2%	76.91	12.17	1.90

جدول۱-۳: اندازه بلورک، میکروکرنش و چگالی دررفتگی نمونههای مورد بررسی [۲۴].

شکل ۱-۲۰، طیف رامان نمونه خالص را نشان میدهد. همانطور که مشاهده می شود قلههای واقع در MoO₃، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۴۷، ۲۹۵، ۳۷۹، ۴۷۴، ۶۶۸، ۹۱۹ و ¹⁻۹۹۴ مربوط به MoO₄ (فاز راست گوشه) می باشند. نواحی محدود به ¹⁻۴۰۰cm و ¹⁻۳۰۰ ۹۰۰ بتر تیب عمدتا به دلیل مدهای خمشی و کششی O-M هستند. قله ¹⁻۹۹۵ مربوط به مد کششی O=⁶⁺M در فاز Mo₃-O و قله ¹⁻۸۱۹/۱cm به مد کششی پیوند Mo-O-Mo و قله ¹⁻۳۳۸/۲cm به مدکششیO-Mo مربوط است. قله های کوتاهتر رامان شامل ۲/۱۵۷، ۲/۳۴ و ¹⁻۳۳۸/۲cm مربوط به مدهای خمشی O=Mo-O و O-Mo هستند.



شکل ۱–۲۱ طیف سنجی فوتو الکترونی اشعه ایکس (XPS) را نشان میدهد. به منظور مطالعه تکمیلی ساختاری لایه های آلاییده شده با یوروپیم از این روش استفاده شده است. اکسایش عنصر یوروپیم در لایه مربوط به Eu₂O₃ است. شدت قله وابسته به Eu₂O₃ با افزایش آلایش یوروپیم افزایش مییابد. هرچند در طیف پراش پرتو ایکس هیچ گونه اثری از فاز مربوط بهEu₂O₃ مشاهده نمی شود در اندازه گیری های XPS حضور Eu₂O₃ مشاهده می شود و ثابت می کند که مقدار کمی از این عنصر در لایه MoO3 خالص وجود دارد. این روش همچنین نسبت های مختلف آلایش یوروپیم در اکسید مولیبدن و ماهیت شیمیایی مواد موجود بر روی سطح و همچنین در داخل لایه را نشان می دهد.



شــكل ۱-۲۲ تصـاویر SEM نمونــه بــدون آلایــش را نشــان مــىدهــد. درایــن نمونــه

جزیره هایی با اندازه های مختلف بر روی سطح ایجاد شده است.



شکل ۱-۲۲: تصویر SEM لایه نازک اکسید مولیبدن[۲۴].

شـکل ۱-۲۳ طیـفهـای عبـور و جـذب نمونـه هـای مـورد بررسـی را نشـان مـی-دهـد. مقـدار میـانگین عبـور نمونـه هـا در ناحیـه مرئـی در حـدود ٪۸۵-۴۰ و مقـدار بازتاب در حدود ٪۳۰-۱۰ میباشد.


شکل ۱-۲۲: الف) طیف عبور و (ب) طیف بازتاب نمونههای مورد بررسی [۲۴].

شکل ۱-۲۴ طیف تغییرات $(ahv)^2$ بر حسب انرژی به ازای (-1) درصد های مختلف آلایش را نشان

مىدھد.



شکل ۱–۲۴: تغییرات $^{(lphahv)^2}$ بر حسب hv نمونه های مورد بررسی [۲۴].



	E _g (eV)
MoO ₃	4.05
MoO ₃ : Eu 0.5%	3.79
MoO ₃ : Eu 1%	3.87
MoO ₃ : Eu 1.5%	3.76
MoO ₃ : Eu 2%	3.85

جدول ۱-۴: گاف نواری نمونه های مورد بررسی[۲۴].

به طور کلی در این تحقیق لایههای نازک اکسید مولیبدن به صورت خالص و آلاییده با یوروپیم بر روی زیرلایه شیشه به روش اسپری پایرولیز فراهم شدند. طیف سنجی پراش پرتو ایکس و رامان وجود فاز راست گوشه را نشان میدهند. طیف سنجی فوتوالکترونی اشعه ایکس وجود فاز دوم Eu2O3 را نشان میدهد. تصاویر SEM وجود ساختار جزیره مانند به خصوص در نمونه های آلاییده با یوروپیم منجر به سطح موثر بزرگی شده است. با توجه به اینکه روش اسپری روشی ساده است ، نتایج بدست آمده میتواند برای حسگرهای گوناگون از جمله حسگرهای زیستی و گازیمورد استفاده قرار گیرد[۲۴].

فصل دوم معرفي روشهاي مشخصه يابي لايه نازک اکسید مولیبدن

۲–۱ مقدمه

امروزه دستگاهها و روشهای بسیاری جهت مشخصه یابی لایههای نازک در دسترس است که برای بدست آوردن خواص فیزیکی و شیمیایی مواد مورد استفاده قرار میگیرند. در ادامه به معرفی دستگاهها و روشهای به کار گرفته شده در این پروژه جهت بررسی لایه نازک اکسید مولیبدن میپردازیم.

۲-۲میکروسکوپ الکترون روبشی گسیل میدانی۱(FE-SEM)

برای تشکیل تصویر در میکروسکوپهای الکترونی گسیل میدانی، یک منبع تولید الکترون اصطلاحاً تفنگ الکترونی وجود دارد که ازنوع گسیل میدانی بوده و وظیفه آن تولید پرتو الکترونی پرانرژی است. تفنگ گسیل میدانی به انرژی حرارتی برای غلبه بر سد پتانسیل سطحی نیاز ندارد. روند کار بدین گونه است که با اعمال میدان الکتریکی بسیار بالا به سطح فلز، الکترون ها از سطح جدا میشوند و اثر تونلی باعث عبور الکترون های تراز رسانش از سد پتانسیل می میشود. هنگام عملیات، الکترون ها توسط میدان ولتاژ اعمال شده، به صورت فیزیکی از نوک بسیار تیز بلور تنگستنی (حدود ۱۰۰mm) جدا میشوند.

تفنگ گسیل میدانی پرتو الکترونی با بیشترین شدت را تولید می کند بطوریکه ۱۰۰برابر بزرگ تر از تفنگ حرارتی با رشته تنگستنی است که نتیجه آن بهبود قدرت تفکیک می باشد. تصاویر -FE SEM اطلاعات عنصری و توپوگرافیکی را در بزرگنمایی ۱۰ تا ۳۰۰۰۰ برابر فراهم می کند بدین ترتیب تصاویر SEM در مقایسه با میکروسکوپهای الکترونی روبشی (SEM)، تصاویری واضحتر با وضوح ۱ تا nm ۵/۰ فراهم می کند[۲۲].

¹ Field Emmission Emission Scaning Electron Microscope



شکل ۲-۱: (الف) نمایی از میکروسکوپ الکترونی روبشی اثر میدانی. (ب) طرحوارهای از اجزاء اصلی یک میکروسکوپ الکترونی روبشی.

۲-۳پراش پر تو ایکس ⁽(**XRD**)

پراش پرتو ایکس، در سال در سال ۱۹۱۲ میلادی توسط لاوه کشف شد. در سال ۱۹۱۳ میلادی توسط ویلیام هنری^۲ و ویلیام لورنتس براگ^۳ جهت بررسی خواص ساختار بلوری مواد مورد استفاده قرار گرفت. XRD برای تعیین کمیت های ساختار بلوری نظیر تعیین اندازه بلورک، جهتگیری تک بلور، ثابت شبکه، تعیین فاز بلور، هندسه شبکه قابل استفاده است. الگوی پراش پرتو X برای هر ماده خالص مانند اثر انگشت است. هنگامی که پرتوهای با طول موج مشخص به جسم بلورین تابانده شوند در اثر برخورد به اتم های ماده با تاخیر فازهای متفاوت بازتاب میکنند که با این روش می توان فاصله صفحات بلوری و زوایای شبکه

- ¹ X-ray Diffraction(XRD)
- 2 William henry

³William Lawrence Bragg



شکل۲-۲: یک طرحوار از نحوه پراش پرتو x از صفحات بلوری.

$$2d_{(hkl)}\sin(\theta) = n\lambda$$
 (۱-۲)
در این رابطه d_{hkl} فاصلهی بین صفحات موازی و متوالی بلوری، (hkl) شاخصهای میلر، λ طول موج
پرتوهای فرودی، n مرتبهی پراش (عدد صحیح) و Θ زاویهی براگ است. شکل ۲-۳ یک نمونه از
دستگاه XRD را که در این پایاننامه برای مشخصه یابی ساختاری نمونه ها مورد استفاده قرار گرفته
است نشان می دهد.



شکل ۲-۳ : تصویری از دستگاه پراش پرتو X.

با استفاده از داده های بدست آمده از الگوی XRD نمونه ها، می توان کمیتهایی نظیر متوسط
اندازه بلورک، کرنش (٤)، چگالی در رفتگی (٤) و ضریب بافت ⁽ (TC)) را محاسبه کرد[۹].
(الف) برای تعیین اندازه بلورکها (D) می توان از فرمول دبای - شرر (۲-۲) استفاده کرد[۹]:

$$D = \frac{k\lambda}{\beta \cos \theta}$$
(۲-۲)
 $C - 1$
 $(T - 7)$
 $\delta = \frac{1}{D^2}$

(د) ضریب بافت (TC) از رابطه (۲–۵) قابل محاسبه است. که در آن N تعداد قلهها ، $I_{(hkl)}$ شدت (C) فریب بافت (TC) از رابطه ($I_{0(hkl)}$ (hkl) ، $I_{0(hkl)}$ شدت اندازه گیری شده توسط کارت JCPDS - 35- JCPDS نسبی مربوط به صفحات بلوری (hkl) ، $I_{0(hkl)}$ شدت اندازه گیری شده توسط کارت 0609 از بلندترین قله در هر نمونه است[P_{0}

(۲–۵)

$$TC_{(hkl)} = \frac{I_{(hkl)} / I_{0(hkl)}}{N^{-1} \sum I_{(hkl)} / I_{0(hkl)}}$$

کاهش انـدازهی بلـورکهـا سـبب افـزایش پهنـای قلـههـای پـراش و کـاهش شـدت
آن مـیشـود[۲۵]. در اثـر جهـت گیـری ترجیحـی بعضـی بلـورکهـا در سـاختار، شـدت
برخـی از قلـههـا افـزایش و برخـی دیگـر کـاهش مـییابـد. از ایـن رو تعیـین تـابع شـدت

¹ Texture Coeffccient (TC)

قلـههای پـراش و مطالعـه تغییـرات آنها، اطلاعات مفیـد و مـوثری از سـاختار مـواد بـه دست مـیدهـد. یکـی از ایرادهای اســتفاده از رابطـه (۲-۲) بـرای محاسـبه انـدازه بلـورکها ایـن است کـه در ایـن رابطـه پهـن شـدگی قلـه هـا تنهـا ناشـی از انـدازه بلـورک هـا در نظـر گرفتـه مـی شـود. در حـالی کـه مطالعـات نشـان مـیداد پهنـای قلـه عـلاوه بـر انـدازه بلـورک می توانـد بـه کـرنشهـای شـبکه بلـوری هـم وابسـته باشـد. انـدازه بلـورکها و کـرنشهـای درون شـبکه ای را مـی تـوان عامـل پهـن شـدگی قلـههـای حاصـل از پـراش پرتـو ایکـس معرفـی کـرد. عـلاوه بـر ایـن کـرنشهـای شـبکهای سـب کـاهش و یـا افـزایش فاصـله بـین صـفحات بلـوری مـیشـوند. بـر اسـاس قـانون بـراگ بـا تغییـر فاصـله بین صفحات بلوری زوایای قلههای پراش تغییر میکند[۲۵].

۲-۴ طیف نگاری عبوری-جذبی

الف)طيف عبوري

با اندازه گیری طیفهای عبور، جذب و بازتاب لایه های نازک و روابط فیزیکی وابسته می توان برخی از خصوصیات اپتیکی آنها نظیر ضریب شکست، ضریب خاموشی، ضریب جذب، گاف نواری و همچنین ضخامت را به دست آورد. همچنین طیف بازتابی نمونهها می تواند اطلاعات مفیدی راجع به ویژگی بازتابی لایهها در ناحیه ی طول موج مرئی و فروسرخ ارائه نماید. این کار غالبا توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر انجام می گیرد. یک نمونه از دستگاه طیف سنجی دو باریکه ای در شکل ۲-۴ نشان داده شده است. این دستگاه شامل دو مسیر یکی برای قرارگیری نمونه مرجع (لایه نازک) و دیگری برای قرارگیری نمونه شاهد (زیرلایه به تنهایی) می باشد. پس از پردازش دادهها دستگاه ضریب عبوری



شکل ۲-۴: الف) نمایی از دستگاه اسپکتروفوتومتر مدل -SHimadzu UV1800 مستقر در آزمایشگاه نانوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود (ب) محل قرارگرفتن نمونه های مرجع و شاهد.

ب) طيف جذبي

هنگامی که پرتو الکترومغناطیسی به جسم برخورد می کند، بخشی از پرتو از جسم عبور می کند، بخشی بازتاب شده و بقیه به نسبت بزرگی ضریب جذب ماده (α) جذب می شود. برای تعیین ضریب جذب در لایه های نازک میتوان از رابطه (۲-۶) استفاده نمود[۲۶]: که در این رابطه d ضخامت لایه، a میزان جذب از لایه می باشد. $\alpha = 2.303 \times \frac{a}{d}$

ج) گاف نواری

هرگاه انرژی فوتون فرودی (hv) از انرژی گاف نواری (Eg) بیشتر یا برابر باشد، الکترونها از نوار ظرفیت به حالت های خالی در نوار رسانش برانگیخته شده و این فوتونها جذب می شود، اما چنانچه انرژی فوتون فرودی کمتر از گاف نواری ماده باشد از آن عبور خواهد کرد. فرآیند جذب در نیمرساناها به ساختار نواری آنها و نوع گاف نواری (مستقیم یا غیرمستقیم) ماده بستگی دارد. بین گاف نواری و ضریب جذب (α) رابطه تاک به صورت زیربرقرار است[۲۷]:

$$(\alpha h v)^m = A(h v - E_g) \tag{Y-Y}$$

در این رابطه hv انرژی فوتون فرودی و A یک مقدار ثابت است. در صورتی که گاف نواری لایه مورد نظر مستقیم باشد ضریب m برابر ۲ و در صورت غیرمستقیم بودن آن m=۰/۵ خواهد بود. با رسم نمودار ^m(ahu) بر حسب انرژی فوتون فرودی (hu) و برون یابی بخش خطی این نمودار با محور افقی می توان گاف نواری نمونه را به دست آورد.

۲-۵ طیف سنجی رامان^۱

طیف سنجی رامان مطالعه بر هم کنش بین نور و ماده است که در آن نور دچار پراکندگی غیر کشسان میشود. در طیف سنجی رامان، فوتون های تک ط_ول م_وج غالب_ا چش_مه ن_ور لي_زر را روی نمون_ه متمر ک_ز م_ی کنن_د فوت_ون ه_ا ب_ا مولکول ها بر هم کنش کرده و بازتابیده، جذب یا پراکنده میشوند. طیف سنجی رامان فوتون های پراکنده شده را مطالعه می کند. غالبا فوتون هایی که با مولکول ها بر هم کنش می کنند، به طور کشسان پراکنده می شوند. به این نوع پراکندگی، یراکنــدگی رایلــی^۲ گفتــه مــیشـود و فوتــون هــای پراکنــده شــده همــان طــول مــوج نــور فرودی را دارند. اما تقریبا از هر یک میلیون فوتون، یک فوتون به طرور غیر کشسان پراکنده میشود. در پراکندگی رامان، فوتون فرودی با ماده برهمکنش كرده و طـول مـوج آن بـه سـمت طـول مـوج هـاي بلنـدتر يـا كوتـاهتر جـا بـه جـا مـيشـود. جــا بــه جـایی بــه طــول مــوج هـای بیشــتر غالــب اســت و ایــن پراکنــدگی را رامـان استوکس می گویند. طیف های رامان هر مولکول، منحصر به فرد است. از این رو م____توان از آن ماننــد اثــر انگشــت در تشــخیص ترکیبـات مولکــولی روی ســطح، درون یک مایع یا در هوا استفاده کرد. شکل ۲-۵ تصویری از دستگاه طیف سنجی رامان موجود در دانشگاه صنعتی شاهرود را نشان میدهد[۲۸–۳۰] .

¹ Raman spectrometer

² Rayleigh scattering

³ Stokes-Raman spectroscopy



شکل ۲-۵: دستگاه طیف سنجی رامان موجود در آزمایشگاه نانو فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

۲-۶ مشخصه یابی الکتریکی

بررسی مشخصه جریان _ ولتاژ (I-V) نمونههای بدست آمده را در ابعاد ² ۲×۱ برش می دهیم و سیم مسی را با چسب نقره به دوسر لایه متصل می کنیم. سپس اتصالات دستگاه جریان_ولتاژ را به سیم های مسی وصل کرده و سپس در بازه مشخصی از ولتاژ میزان جریان خروجی را اندازه گیری می کنیم. به کمک تغییرات جریان بر حسب ولتاژ می توان به نوع اتصال فلز نیم رسانا پی برد. هر گاه این تغییرات خطی باشد اتصال اهمی بوده و چنانچه غیر خطی باشد اتصال یکسو کننده است. در اتصال اهمی می توان مقدار مقاومت الکتریکی نمونههای بدست آمده را با استفاده از قانون اهم (۲–۸) بدست آورد.

$$R = \frac{V}{I} \tag{A-Y}$$

شکل (۲-۶) تصویر دستگاه اندازه گیری مشخصه الکتریکی مورد استفاده در دانشگاه شاهرود را نشان میدهد.



شكل ۲-۶: دستگاه آناليز الكتروشيميايي مدل PGS2065 در دانشگاه شاهرود جهت تعيين مشخصه I-V نمونهها.

فصل سوم جزئیات مراحل آزمایشگاهی رشد و سنتز لايه هاى نازك اكسيد موليبدن

۳-۱ مقدمه

مطالعه لایه های نازک با پیدایش نانو فناوری بیشترین تغییر و تحول را همراه داشته است. خواص لایه های نازک وابسته به ساختار و مورفولوژی آن ها طی فرآیند آماده سازی میباشد. از پارامترهای وابسته به رشد میتوان به دمای زیرلایه، آهنگ لایهنشانی، غلظت محلول و... اشاره کرد. در این بخش به معرفی روش های لایه نشانی میپردازیم و سپس روش اسپری پایرولیزیز، که در این تحقیق برای رشد لایه ها از آن استفاده کرده ایم، و جزئیات مراحل آزمایشگاهی را معرفی میکنیم.

روش لایه نشانی از عوامل موثر بر خواص و کیفیت لایههای نازک است. روشهای لایه نشانی به دو دسته فیزیکی و شیمیایی تقسیم میشوند. از روش های فیزیکی میتوان روش کندوپاش^۱ رسوب-گذاری بخار فیزیکی(PVD)^۲، تبخیر حرارتی^۲، روآراستی پرتو مولکولی(MBE)^۴ و... اشاره کرد.از روش-های شیمیایی اسپری پایرولیز^۵، رسوب گذاری بخار شیمیایی(CVD)^۵ و رسوب گذاری حمام شیمیایی(CBD)^۶ را نام برد. در ادامه به معرفی روش اسپری پایرولیز که از آن برای تهیه لایههای نازک اکسید مولیبدن استفاده شده است میپردازیم.

۲-۳ روش اسپری پایرولیز

این دستگاه به منظورتهیه لایههای نازک و نانو ساختارهای گوناگون ساخته شده است. در این دستگاه از محلول شیمیایی استفاده شده و با ایجاد حرارت بالا بر روی یک صفحه داغ که زیرلایهها بر روی آن قرار می گیرند شرایط را برای تجزیه شیمیایی محلول اسپری شده فراهم می سازد شکل (۳–۱). از مزیتهای این دستگاه در مقایسه با سایر روشها تکنولوژی ساده، ارزان، عدم نیاز به خلا وامکان لایه نشانی در سطوح بزرگ است[۱۷] . روش کار در این دستگاه بدین گونه است که محلول شیمیایی در

¹ Sputtering

² Thermal Evaporation

³ Molecular Beam Epitaxy (MBE)

⁴ Spray Pyrolysis

⁵ Chemical vapor deposition

⁶ Chemical bath deposition

مخزن محلول قرار گرفته و توسط تنظیم کننده فشار گاز حامل از طریق نازل اسپری برروی زیرلایه ها که روی صفحه داغ قرار گرفته اند پاشیده میشود و فرآیند لایه نشانی انجام میشود. دمای این صفحه که همان دمای زیرلایه است از طریق کنترل جریان عبوری از المنتهای تعبیه شده در زیر صفحه تنظیم میشود.



شکل۳-۱: (الف) دستگاه اسپری پایرولیز (Spray Coating System.S.C.S.86) موجود در دانشگاه صنعتی شاهرود، (ب) طرح واره ای از دستگاه اسپری پایرولیز.

۳-۳ رشد و سنتز لایههای نازک اکسید مولیبدن

۳–۳–۱ آماده سازی زیر لایه

در روند لایه نشانی نحوه شستشو برای زیر لایهها امری مهم است در این تحقیق از زیرلایه شیشه

استفاده شده است که نحوه شست و شوی آنها به ترتیب زیر می باشد:

- شستشوی زیرلایهها با آب مقطر و مایع ظرفشویی
 - جوشاندن زیرلایهها با آب مقطربه مدت ۲۰min
- قرار دادن زیرلایهها دربشری شامل محلول اتانول و آب مقطر در دستگاه التراسونیک به مدت ۲۰min
 - خشک کردن زیر لایهها با فشار هوا

۳-۳-۲ تهیه محلول اولیه

برای تهیه لایههای نازک اکسید مولیبدن، پودر آمونیوم هپتا مولیبدات تترا هیدرات برای تهیه لایههای نازک اکسید مولیبدن، پودر آمونیوم هپتا مولیبدات تترا هیدرات محیط حل (NH4)6M07O244H2O) در ۵۰ml آب دوبار تقطیر به وسیله همزن مغناطیسی در دمای محیط حل می شود. محلول بدست آمده بی رنگ و کاملا شفاف است. فرآیند کلی واکنش و تشکیل اکسید مولیبدن در فرآیندلایه نشانی با رابطه (۱–۳) داده شده است.

 $(NH_4)_6Mo_7O_{24}4H_2O \longrightarrow 7MoO_3(s) + 6NH_3(g) + 7H_2O(g)$ (1-7)

۳-۴ پارامترهای لایه نشانی
در این تحقیق به بررسی عوامل گوناگون موثر بر خواص فیزیکی لایههای نازک اکسید مولیبدن
پرداخته شده است. که عبارت اند از:

- آهنگ لایه نشانی: ml/min ۵، ۲/۵، ۱/۵
 - نحوه ی اسپری
 - غلظت محلول اوليه: MM ۱۵، ۱۰، ۵
 - دمای زیرلایه: *°C* ۴۵۰،۴۵۰ ۳۵۰

فصل چهارم نتایج و بحث وابسته به سنتز لایه های نازک اکسید مولیبدن

۴–۱ مقدمه

در این بخش تاثیر پارامترهای گوناگون لایهنشانی برخواص فیزیکی لایههای نازک اکسید مولیبدن سنتز شده به روش اسپری پایرولیز، مورد مطالعه و بحث قرار گرفته است. پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق آهنگ اسپری، نحوهی اسپری، غلظت محلول و دمای زیرلایه است. مشخصه یابیهای استفاده شده دراین تحقیق عبارتند از: الگوی پراش پرتوایکس(XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (-FE SEM)، طیف نگار نوری(UV-Vis)، طیف سنجی رامان و بررسی خواص الکتریکی لایههای نازک اکسید مولیبدن. در ادامه به بحث پیرامون نتایج بدست آمده در این تحقیق می پردازیم.

ابتدا به بررسی اثر آهنگ لایه نشانی بر خواص فیزیکی لایههای نازک اکسید مولیبدن پرداختهایم

۴-۲ بررسی تغییرات آهنگ لایه نشانی بر خواص فیزیکی لایه نازک اکسید مولیبدن

در این بخش به بررسی اثر آهنگ لایه نشانی بر خواص فیزیکی لایههای نازک اکسید مولیبدن پرداخته ایم. بدین منظور لایهها در سه آهنگ لایه نشانی ۲/۵،۱/۵ و ml/min ۵ (به ترتیب نمونههای R2،R1 و R3) با غلظت محلول M ۰/۰۱ در دمای C[°]۴۰۰ بر روی زیرلایه شیشه و با فاصله افشانه تا زیرلایه به اندازه ۳۷cm فراهم شدند.

مطالعه مورفولوژی سطح

برای بررسی مورفولوژی سطح نمونهها، تصاویر FE-SEM نمونهها در مقیاس nm ۵۰۰ از بالا و مقطع عرضی تهیه شده است (شکل۴–۱). این تصاویر نشانگر آن است که هر سه نمونه شامل میلههای متخلخل در هم تنیده ای هستند، به طوری که نمونه یR1 دارای سطحی متخلخل و برجسته متشکل از میلههایی با دانههایی بر روی آنها با ابعاد کوچکتر از nn ۵۰ بوده و با افزایش آهنگ اسپری (نمونه-های 22و R3) از میزان ناهمواریهای سطحی لایهها کاسته و همچنین ابعاد دانههای تشکیل دهنده میلهها بزرگتر شده است. با توجه به تصاویر مقطع عرضی مشاهده می شود که با افزایش نرخ رشد ضخامت میلهها افزایش یافته و مقدار آن برای نمونههای R1 و R3 بترتیب ۲۶۵، ۳۲۵ و ۳۶۵nm است.



شکل۴-۱: تصاویر FE-SEM نمونه های مورد بررسی تهیه شده در آهنگ های اسپری مختلف از بالا و مقطع عرضی.

مطالعه خواص ساختاری

برای بررسی ویژگیهای ساختاری نمونهها از الگوی پراش پرتو X استفاده شده است(شکل ۴-۲). این دادهها ساختار بسبلوری اکسید مولیبدن با ساختار راست گوشه و صفحات اصلی (۲۰۰)، (۰۴۰) و (۰۶۰) را مطابق با شماره کارت JCPDS 35-0609 نشان میدهد [۱۷و ۲۰].



شکل۴-۲: طیف XRD نمونههای مورد بررسی در آهنگ های رشد ۱/۵، ۲/۵ و ml/min ۵ به ترتیب نمونه های R2 ،R1

به منظور بررسی بیشتر در خواص ساختاری نمونهها از روابط (۲-۲)، (۲-۳) و (۲-۴) برای تعیین ابعاد بلورکها(D)، میکروکرنشهای بلوری(ع) و تراکم دررفتگیها (δ) برای نمونههای سنتز شده استفاده کردهایم. جداول (۴-۱)، (۴-۲) و (۴-۳) ابعاد بلورکها و تراکم دررفتگیها میکروکرنشهای بلوری را برای قلههای (۰۲۰)،(۰۴۰)و(۰۶۰)را به صورت جداگانه نشان میدهند.

همانطور که مشاهده می شود برای قلههای (۲۲۰) (قله ترجیحی) و (۰۴۰) با افزایش آهنگ اسپری اندازه بلورکها افزایش و میکروکرنشهای بلوری و تراکم دررفتگیها کاهش یافتهاند که در مورد قله (۰۶۰) با افزایش آهنگ اسپری اندازه بلورکها کاهش و میزان میکروکرنشهای بلوری و تراکم دررفتگی-ها افزایش پیدا کردهاند.

نمونه	D (nm)	δ ($^{+}$ nm ⁻²)	£(1. ^{-r})
R_1	۲۵/۲۹	۱/۵۶	۱/۳۶
R ₂	79/•٣	١/٤٧	١/٣٢
R ₃	78/04	1/41	۱ /۳۰

جدول۴-۱: اندازه بلورکها، تراکم دررفتگیها و میکروکرنشهای بلوری برای قله ترجیحی (۰۲۰).

نمونه	D (nm)	δ ($^{-r}$ nm ⁻²)	۲)-۲)3
R ₁	74/7.	١/٧٠	۲/۴۳
R ₂	26/90	١/٦٠	١/٣٨
R ₃	20/88	۱/۵۱	١/٣۴

جدول۴-۲: اندازه بلورکها، تراکم دررفتگیها و میکروکرنشهای بلوری برای قله (۰۴۰).

جدول۴-۳: اندازه بلورکها، تراکم دررفتگیها و میکروکرنشهای بلوری برای قله (۰۶۰).

نمونه	D(nm)	δ (1 ·- r nm ⁻²)	(۲۰۰ ^۳)
R ₁	21/16	١/٣۵	١/٢٧
R ₂	76/98	١/٣٧	١/٢٨
R ₃	78/88	١/۴٠	١/٣٠

جدول ۴-۴ ضریب بافت(رابطه ۲-۵) را برای قلههای (۲۲۰)، (۲۰۰) و (۲۰۰) نشان میدهد. همانطور که مشاهده می شود مقدار ضریب بافت در هر سه نمونه در راستای (۲۰۰) نسبت به سایر راستاها بیشتر است که نشان دهنده راستای ترجیحی در ساختار بلوری برای هر سه نمونه می باشد.

نمونه	TC ₀₂₀	T C ₀₄₀	TC ₀₆₀
R1	1/44	٠/٩٩	•/۵۵
R2	1/87	۱/۰۳	•/44
R3	१/४९	۱/۰۴	۰/۴۵

جدول ۴-۴: ضریب بافت برای قلههای اصلی (۲۰)، (۰۴۰) و (۰۶۰).

شـکل۴–۳ طیـف رامـان نمونـههـای مـورد بررسـی را نشـان مـیدهـد. همـانطـور کـه مشـاهده مـیشـود بـا افـزایش آهنـگ اسـپری شـدت قلـههـای رامـان افـزایش یافتـه-انــــد. قلــــههـــای ۹۹۵۲۲، ۱۵۷/۲، ۲۸۳/۲، ۲۸۳/۶ مارمـان و^{۱-} ۹۹۵۲ مربـــوط بـهدMoO (فـاز راسـت گوشـه) مـیباشـند کـه بـا گـزارش مـارتینز و همکـاران [۱۷] و همچنین کامونا و همکاران[۲۴] مطابقت دارند.

نـــواحی محـــدود بـــه ¹⁻ ۲۰۰۰ – ۲۰۰ و ¹⁻ ۹۰۰ – ۶۰۰ بــه ترتیـــب عمــدتا بـــه دلیــل مــدهای خمشــی و کششــی Mo-O هســتند. قلــه ¹⁻ ۹۹۵cm مربــوط بــه مــد کششــی Mo⁺⁶=O در فــاز MoO3 و قلــه ¹⁻ ۸۱۹/۱cm بــه مــد کششــی پیونــد -Mo O-Mo و قلــه ¹⁻ ۶۶۸/۲cm در فـای کوتــاهتر رامــان شــامل ۶۶۸/۲cm، ۶۲۸/۲ و ۳۳۸/۲cm مربــوط بــه مــدهای خمشــی O=Mo=O و O-Mo-O هستند[۲۴].



شکل ۴–۳ :تصویر رامان نمونههای مورد بررسی در آهنگ های رشد ۱/۵، ۲/۵ و ۵ ml/min 4 به ترتیب نمونه های R3 و R3.

خواص اپتيكى

شکل ۴–۴ (الف) و (ب) به ترتیب طیفهای عبور و جذب اپتیکی لایههای مورد بررسی را نشان میدهد. نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که با افزایش آهنگ لایهنشانی میزان عبور به طور نسبی کاهش یافته است. این تغییرات میتواند ناشی از افزایش ضخامت لایههای تهیه شده باشد.



شکل ۴-۴: طیفهای (الف)عبور و(ب) جذب اپتیکی در لایههای مورد بررسی در آهنگ های رشد ۱/۵، ۲/۵ و و R2 های R2 ای R1 و Ml/min

با استفاده از داده های طیف جذب (a) می توان ضریب جذب نمونه (α) را
به کمک رابطه (۲-۶) بدست آورد. با استفاده از رابطه (۲-۷) و با رسم منحنی
(αhv) برحسب *hv* و برون یابی داده ها در گستره خطی با محور افقی به ازای
$$\alpha = 0$$
 بزرگی گاف نواری مستقیم (Eg) تعیین می شود (شکل ۴-۵). چنانچه
پیداست، نمونه با بزرگترین ابعاد بلورکی (R3) وابسته به قله ترجیحی (۲۰۰)،
دارای کوچکترین گاف نواری و نمونه با کوچکترین ابعاد بلورکی(R1) دارای
بزگترین گاف نواری می باشد (شکل ۴-۵-۵). این تغییرات گویای امکان کنترل
گاف نواری توسط ابعاد بلورکها بوده که با وقوع اثر محدودیت کوانتمی سازگار
است.



شکل ۴–۵: (a,b,c)تغییرات^۲(αhv) برحسب انرژی فوتون ها در لایه های رشد داده شده به ازای آهنگ های اسپری مختلف و (d) تغییرات گاف نواری و اندازه بلورک بر حسب نرخ رشد در نمونههای مورد بررسی

نتيجه گيرى

لایههای نازک با فاز خالص اکسید مولیبدن با استفاده از پیش ماده آمونیوم مولیبدات تترا هیدرات در دمای C[°] ۴۰۰ به روش اسپری پایرولیز با آهنگهای رشد مختلف تهیه شدند. تصاویر FE-SEM نشان دهنده وابستگی مورفولوژی سطح نمونهها به تغییرات آهنگ اسپری بوده و طیف XRD لایهها حاکی از رشد بس بلوری در فاز راستگوشه در راستاهای بلوری (۲۰۰) قله ترجیحی، (۴۰۰) و(۰۶۰) میباشد. طیف رامان وجود فاز راستگوشه را تایید میکند. تحلیل دادهها بیانگر بهینگی ابعاد بلورک میباشد. طیف رامان وجود فاز راستگوشه در استاهای بلوری (۳۰۰) می باشد. تحلیل دادهها بیانگر مهینگی ابعاد بلورک ها و نیز تراکم نقایص بلوری در نمونه R3 (با آهنگ اسپری mi/mi ۵) می باشد. تحلیل دادههای جذب ایتیکی لایهها نشان داد که نمونههای سنتز شده دارای گاف نواری ایتیکی در بازه V9 ۳/۵۰–۳/۵۶

شده باشد.

در بین نمونههای دیگر به بررسی خواص در بین نمونهه R3 در بین نمونههای دیگر به بررسی خواص فیزیکی نمونهای مشابه ازلحاظ شرایط رشد این لایه لیکن با قدری تفاوت در نحوه اسپری میپردازیم.

۴-۲-۱ بررسی تاثیر نحوه ی متفاوت اسپری بر خواص فیزیکی لایههای نازک اکسید مولیبدن

در این بخش به بررسی تاثیر نحوهی متفاوت اسپری بر خواص فیزیکی لایههای نازک اسید مولیبدن میپردازیم. چنانچه در بخش ۴–۲ آمد در نمونه R3، که در شرایط حجمی ۵۰ml محلول و با غلظت ۱۸۸/ در دمای ۴۰۰⁰C بر روی زیرلایه شیشه با آهنگ ۵ml/min اسپری شد از بلورینگی بهتری نسبت به دو نمونه دیگر برخوردار بود. برآن شدیم تا تاثیر تغییر مختصر در نحوه اسپری بر خواص فیزیکی لایههای نازک اکسید مولیبدن بپردازیم. در این نمونه (3'R)، اس۲ از محلول اولیه با آهنگ min/min و باقی مانده حجم اولیه (۱۳ ۸۹) با آهنگ ml/min ۵ با غلظت ۱۸/۱۰ در دمای ۲۰۰۰ بر روی زیرلایه شیشه اسپری شد. در ادامه به بررسی نتایج مربوط به مورفولوژی سطح، خواص اپتیکی، خواص ساختاری و الکتریکی این لایه پرداخته ایم.

مورفولوژی سطح

شکل ۴–۶ تصاویر FE-SEM مورفولوژی نمونهها در مقیاسهای ۵۰۰nm و ۳۳را نشان می-دهد. این تصاویر نشانگر آن است که نمونه R3 در مقیاسμm ۳۰ شامل زنجیرههای متصل به هم میباشد که به شکل حلقه و دایرههایی متصل به هم هستند. در ابعاد ۵۰۰nm سطح به صورت متخلخل و برجسته متشکل از میلههایی با دانههایی بر روی آنها با ابعاد کوچکتر از nm ۵۰ مشاهده میشود. چنانچه پیداست با تغییر در نحوه اسپری تراکم زنجیرهها افزایش یافته و از نانومیله به شکل دانه ای درآمده اند.



شکل۴-۶: تصاویر FE-SEM نمونههای مورد بررسی با تغییر در شیوه اسپریR2 و R'3.

خواص ساختاری

برای بررسی ویژگیهای ساختاری نمونه 3'R از الگوی پراش پرتو ایکس استفاده شده است (شکل ۴–۷). این دادهها ساختار بسبلوری اکسید مولیبدن با ساختار راست گوشه و صفحات اصلی (۲۲۰)، (۲۴۰) و (۲۶۰) را مطابق با شماره کارت JCPDS35-0609 نشان میدهد که با دیگر گزاراشات مطابقت دارند[۱۷و۲۰]. چنانچه پیداست شدت قلههای وابسته به صفحات بلورین یاد شده در نمونه 3'R به طور نسبی مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده اند.



شکل۴-۷-طیف XRD نمونههای مورد بررسی با تغییر در شیوه اسپریR2 و 2'R.

به منظور بررسی بیشتر در خواص ساختاری نمونهها از روابط (۲-۲)، (۲-۳) و (۲-۴) برای تعیین ابعاد بلورکها(D)، میکروکرنشهای بلوری(ع) و تراکم دررفتگیها (δ) برای نمونههای سنتز شده استفاده میکنیم. جداول (۴-۵)، (۴-۶) و (۴-۷) ابعاد بلورکها و تراکم دررفتگیها میکروکرنشهای بلوری را به ترتیب برای قلههای(۲۰۰)(قله ترجیحی)، (۰۴۰) و (۰۶۰) نشان میدهند. همانطور که مشاهده میشود با تغییر در شیوه اسپری اندازه بلورکها برای هر سه قله، افزایش و میکروکرنشها و چگالی دررفتگیهای بلوری کاهش یافته اند.

نمونه	D (nm)	$\delta(1 \cdot r^{r} nm^{-2})$	£(۱۰۰ ^۳)
R3	78/04	1/41	۱/۳۰
R'3	K 9/WK	1/18	1/18

جدول۴-۵: اندازه بلورکها، تراکم دررفتگیها و میکروکرنشهای بلوری برای قله ترجیحی(۲۰).

نمونه	D (nm)	$\delta(1 \cdot r^{r} nm^{-2})$	^۳ -۰۲)3
R3	۲۵/۶۸	١/۵١	1/84
R'3	۲٧/۲۰	١/٣۵	1/24

جدول۴-۶: اندازه بلورکها،تراکم دررفتگیها و میکرونشهای بلوری برای قله (۰۴۰).

جدول۴-۲: اندازه بلورکها،تراکم دررفتگیها و میکروکرنشهای بلوری برای قله (۰۶۰).

نمونه	D(nm)	$\delta(1 \cdot r^{r} nm^{-2})$	(۲۰۰ ^۳)
R3	78/88	١/۴٠	١/٣٠
R'3	۲۸/۰۲	١/٣٧	١/٢٣

جدول ۴-۸ ضریب بافت (رابطه ۲-۵) را برای سه قلههای پراش (۲۲۰)، (۰۴۰) و (۰۶۰) نشان میدهد. مقدار ضریب بافت در هر سه نمونه در راستای (۲۲۰) نسبت به سایر راستاها بیشتر است که نشان دهنده راستای ترجیحی در ساختار بلوری نمونه میباشد.

نمونه	TC ₀₂₀	TC ₀₄₀	TC ₀₆₀
R3	1/११	1/• 4	•/۴۵
R'3	1/41	١/•٨	•/۴٩

جدول۴-۸: ضریب بافت برای قلههای (۲۰۰)، (۰۴۰) و (۰۶۰).

شـکل۴–۸ طیـف رامـان نمونـههـای مـورد بررسـی را نشـان مـیدهـد. قلـههـای ۸۱۹/۱، ۶۶۸/۲، ۳۳۸/۲، ۲۸۳/۴ و ۹۹۵cm⁻¹ و ۹۹۵cm⁻¹ (فــــاز راسـت گوشـه) مـیباشـند کـه بـا گـزارش مـارتینز و همکـاران [۱۷]و همچنـین کامونـا و همکـاران[۲۴] مطابقــت دارنــد. نــواحی محــدود بــه ¹⁻۴۰۰cm و ۲۰۰ و ¹⁻cm و همکـاران ۲۴] مطابقــت دارنــد. نــواحی محــدود بــه ¹⁻۴۰۰cm همچنـین کامونـا ۲۰۹۰-۰۰۰ بترتیـب عمـدتا بـه دلیـل مـدهای خمشـی و کششـی O-M هسـتند. قلـه ۹۹۵cm⁻¹ بـه مـد کششـی O=⁶⁺۵۸ در فـاز ۵۵/۵۳ و قلــه ¹⁻۸۱۹/۱cm بـه مــد کششــی پیونــد Mo-O-Mo و قلــه ۶۶۸/۲cm⁻¹ بــه مــد کششــیO-Mo₃-O مربـوط اســت. قلــه هـای کوتـاهتر رامـان شـامل ۱۵۷/۲ و ۳۳۸/۲cm مربـوط بــه مدهای خمشی O=Mo=O و O-Mo-O هستند[۲۴].



شکل۴-۸: تصویر رامان در نمونه ها ی مورد بررسی با تغییر در شیوه اسپریR3و S'R.

خواص الكتريكي

شـکل۴–۹ نمـودار جریـان-ولتـاژ(I-V) نمونـههـا را در بـازه ۱/۵ تـا ۱/۵۷– نشـان مـیدهـد. ایـن نتـایج نشـان دهنـده رفتـار اهمـی اتصـالات در ایـن نمونـههـا مـیباشـد. مقاومـت نمونـه R3 و2'R بـه ترتیـب برابـر بـا ۵ و ۰۸۳ GΩ ۱/۸۰ اسـت. مشـاهده مـیشـود کـه بـا تغییـر در شـیوه اسـپری، مقـاوت الکتریکـی لایـه در حـدود ۶ برابـر کـاهش یافتـه اسـت کـه مـیتوانـد ناشـی از افـزایش تحـرک حامـلهـا بـه علـت افـزایش انـدازه بلـورکهـا وکـاهش چگـالی دررفتگـیهـا و میکروکـرنشهـای بلـوری و همچنـین افـزایش تـراکم نواقص بلوری وابسته به تهی جاهای اکسیژن در این نمونه باشد[۱۷] به طوری که تراکم وابسته به ترازهای نواقص بلوری میتواند منجر به افزایش پهنای دنباله نواری در نزدیکی لبه رسانش گردد. حضور این دنباله نواری چنانچه در بخش اپتیکی پرداخته شده است میتواند بر گاف نواری اپتیکی نمونه ا تاثیر بگذارد.



شکل۴-۹: نمودار I-V نمونههای مورد بررسی با تغییر در شیوه اسپریR3و S'R.

خواص اپتيكى

شــکل ۴-۱۰ (الـف) و (ب) بــه ترتیـب طیـفهـای عبـور و جـذب اپتیکـی لایـه-هـای مـورد بررسـی را نشـان مـیدهـد. نتـایج بدسـت آمـده نشـان دهنـده آن اسـت کـه بـا تغییـر روش اسـپری میـزان عبـور بـه طـور نسـبی کـاهش و جـذب افـزایش یافتـه اسـت. ایـن تغییـرات مـیتوانـد ناشـی از افـزایش خاصـیت فلزگـونی نسـبی 2°R (در مقایسـه بـا (R3) که منجر به افزایش بازتاب نور در این لایه میگردد باشد.



شکل ۴-۱۰: طیفهای (الف)عبور و(ب) جذب اپتیکی در لایههای مورد بررسی با تغییر در شیوه اسپریR3و E'R.

با استفاده از دادههای طیف جذب (a) و با استفاده از رابطه (۲-۷) و با رسم منحنی²(ahu) برحسبhu و برون یابی دادهها در گستره خطی با محور افقی به ازایa=0 بزرگی گاف نواری مستقیم (۲/۳eV) تعیین شد (شکل۴–۱۱). نتایج این تحلیل نشان می دهد که نمونه 3'R از گاف نواری ۲/۳eV (Eg) برخوردار است که در مقایسه با نمونه R3 به میزان ۷۶/۳۷ کوچکتر است. تقلیل گاف نواری در برخوردار است به نمونه به خواص الکتریکی لایهها متاثر از شکلگیری دنباله نواری پهنتر در این نمونه R3 می نمونه در این می دهد که نمونه ۲/۳eV نواری بهنتر در این نمونه در است. تقلیل گاف نواری در برخوردار است به نمونه R3 به میزان ۲۶eV به میزان ۲۶eV کوچکتر است. تقلیل گاف نواری در نمونه ۲۶eV می تواند با توجه به خواص الکتریکی لایهها متاثر از شکلگیری دنباله نواری پهنتر در این نمونه نمونه نمونه R3 باشد.



شکل۴–۱۱: تغییرات²(ahv) بر حسب انرژی فوتونها در نمونههای مورد بررسی با تغییر در شیوه اسپریR3و E'3.

نتيجه گيرى

لایـههای نازک با فاز خالص اکسـید مولیبـدن با اسـتفاده از یـیش مـاده آمونیـوم مولیبِدات تتـرا هیـدرات در دمـای ۴۰۰° بـه روش اســیری یـایرولیز بـا غلظــت ۱۰mM تهیـه شـدند. در نمونـه (R3) ۵۰ml از حجـم محلـول اولیـه بـرروی زیرلایـه شیشیه با آهنگ ۵ml/min و در نمونه (R'3)، ۲ ml از محلول اولیه با آهنگ ۳ml/min و بــاقی مانــده حجــم محلـول (۴۸ml) بــا آهنــگ ۵ml/min اســپری شــد. در تصاویر FE-SEM مشاهده می شود با تغییر در نحوه اسپری تراکم زنجیره ها افزایش یافتـه و از نانومیلـه بـه شـکل دانـهای درآمـده انـد. طیـف XRD لایـه هـا حـاکی از رشید بسیلوری در فاز راست گوشیه در راستاهای بلوری (۲۰)، (۰۴۰) و (۰۶۰) مے باشد بے طوری کے با نمونے R3 از کیفیے بلوری بالاتری برخوردار اسے طیف رامان وجود فاز راست گوشه را تایید می کند. تحلیل دادهای اپتیکی نمونههای سنتز شده نشان داد که با تغییر در شیوه اسپری مقاومت الکتریکی لایه افزایش یافته و در مقابل میران عبور کهه و جذب آن افزایش یافته است. همچنین گاف نواری ایتیکی با تغییر در روش اسپری از ۳/۵۶e۷ به ۳/۳ eV کاهش یافته است. این تغییرات میتواند متاثر از افزایش میزان پراکندگی نور بر اثر افزایش تراکم حامل های بار آزاد و نیز کنترل گاف نواری توسط تغییرات پهنای دنباله نواري باشد.

در بخش بعد به تاثیر تغییرات غلظت محلول بر خواص فیزیکی نمونه R3 پرداخته ایم. ۴–۳ بررسی تاثیر غلظت محلول بر خواص فیزیکی لایه های نازک اکسید مولیبدن

در ایـن بخـش بـه بررسـی تـاثیر غلظـت محلـول بـر خـواص فیزیکـی لایـههـای نـازک اسـید مولیبـدن پرداختـه ایـم. در ایـن بخـش نمونـههـا در غلظـتهـای محلـول ۱۰/۰۱۰، ۱۰/۰۰ (همـان نمونـه R3 در بخـش ۲-۴) و ۱۵۸۸/۱۰ (بـه ترتیـب M1، ۱۵ و M2 (۱۹ میـا آهنـگ ۵ml/min در دمـای ۴۰۰⁰C بـر روی زیرلایـه شیشـه اسـپری شدند.

مورفولوژی سطح



شکل۴–۱۲: تصاویر FE-SEM نمونههای مورد بررسی با غلظتهای ۵، ۱۰ و ۱۵Mm به ترتیب نمونه های M1، M2 وM3 .

خواص ساختاری

برای بررسی ویژگیهای ساختاری نمونهها از الگوی پراش پرتو ایکس مطابق با شماره کارت JCPDS35-0609 استفاده شده است(شکل ۴-۱۳). این دادهها حاکی از شکل گیری ساختار بسبلوری اکسید مولیبدن با ساختار راست-گوشیه و صفحات اصلی (۰۲۰)(قلیه ترجیحی)، (۰۴۰) و (۰۶۰) می باشد با دیگر گزاراشات مطابقت دارند[۱۷و۲۰].



شکل۴–۱۳:طیف XRD نمونههای مورد بررسی با غلظتهای ۵، ۱۰ و ۱۵Mm به ترتیب نمونه های M1، M2 وM3 .

به منظور بررسی بیشتر در خواص ساختاری نمونه ها از روابط (۲-۲)، (۲-۳) و (۲-۴) برای تعیین ابعاد بلوری ها (D)، میکروکرنش های بلوری (ع) وتراکم دررفتگیها (δ) استفاده شده است. جداول (۴-۹)، (۴-۱۰) و (۴-۱۱) ابعاد بلوری ها وتراکم دررفتگی ها میکروکرنش های بلوری را به ترتیب برای قله-مای (۲۰۰)، (۰۴۰)و(۰۶۰) نشان میدهند. چنانچه پیداست نمونه M3 از بالاترین مقدار ابعاد بلورکی در مقایسه با دو نمونه دیگر به ازای هر سه قله اصلی پراش برخوردار است.

نمونه	D(nm)	$\delta(1 \cdot r^{-r} nm^{-2})$	۲·•۲)3
M ₁	۲۷/۸۴	۱/۳۶	1/74
M ₂	26/04	1/41	١/٣٠
M ₃	79/84	١/١٣	1/18

جدول۴-۹: اندازه بلورکها،تراکم دررفتگیها و میکروکرنشهای بلوری برای قله ترجیحی (۰۲۰).

نمونه	D (nm)	$\delta(1 \cdot r^{n} nm^{-2})$	E(1. ^{-r})
M1	20/26	। /१९	1/341
M ₂	۲۵/۶۸	۱/۵۱	१/٣۴٩
M ₃	۲۷/۹۳	١/٢٨	1/ 24

جدول۴-۱۰: اندازه بلورکها،تراکم دررفتگیها و میکروکرنشهای بلوری برای قله (۰۴۰).

جدول۴-۱۱: اندازه بلورکها،تراکم دررفتگیها و میکروکرنشهای بلوری برای قله (۰۶۰).

نمونه	D (nm)	$\delta(1 \cdot r^{r} nm^{-2})$	^۲ ••۲)3
M_1	۲ <i>۶</i> /۵۹	١/۴١	١/٣٠٣
M ₂	79199	١/۴٠	۱/۳۰۰
M ₃	27/71	١/٢٠	١/٢٠

جدول (۴–۱۲) ضریب بافت (رابطه ۲–۵) را به ازای قلههای پراش (۲۲۰)، (۲۴۰) و (۲۶۰) نشان میدهد. مقدار ضریب بافت در هر سه نمونه در راستای (۲۲۰) نسبت به سایر راستاها بیشتر است که نشان دهنده راستای ترجیحی در ساختار بلوری میباشد.

نمونه	TC ₀₂₀	TC ₀₄₀	TC ₀₆₀
M1	۱/۴۶	۱/•۶	•/۴۶
M2	1/41	١/•٨	•/49
M3	١/٣٣	1/17	•/۵۳

جدول۴-۱۲ : ضریب بافت برای قلههای پراش (۲۰۰)، (۰۴۰) و (۰۶۰).
شکل⁴–۱۴ طیف رامان نمونههای مورد بررسی با افزایش غلظت محلول را نشان میدهد. قلههای شکل⁴–۱۴ طیف رامان نمونههای مورد بررسی با افزایش غلظت محلول را نشان میدهد. قلههای میباشند که MoO_3 (فاز راست گوشه) میباشند که با گزارش مارتینز و همکاران [۱۷]و همچنین کامونا و همکاران[۲۴] مطابقت دارند. نواحی محدود به با گزارش مارتینز و همکاران [۱۷]و همچنین کامونا و همکاران[۲۴] مطابقت دارند. نواحی محدود به $^{-1}$ با گزارش مارتینز و همکاران [۱۷]و همچنین کامونا و همکاران[۲۴] مطابقت دارند. نواحی محدود به با گزارش مارتینز و همکاران [۱۷]و همچنین کامونا و همکاران[۲۴] مطابقت دارند. نواحی محدود به محدود به مارتینز و همکاران [۱۷]و همچنین کامونا و همکاران[۲۴] مطابقت دارند. نواحی محدود به محدود به مارتینز و همکاران [۱۷]و همچنین کامونا و همکاران[۲۴] مطابقت دارند. نواحی محدود به محدود



شکل۴+۴: تصویر رامان در نمونه ها ی مورد بررسی با غلظتهای ۵، ۱۰ و ۱۵Mm به ترتیب نمونه های M1، M2 وM3 .

خواص الکتریکی شـکل۴–۱۵ نمـودار جریـان-ولتـاژ(I-V) نمونـههـا را در بـازه ۱/۵ تـا ۱/۵۷-نشـان مـیدهـد. نتـایج گویـای آن اسـت کـه مقاومـت الکتریکـی بـا تغییـر غلظـت محلـول از ۵ بـه ۱۰mM از ۲۰/۸۳ بـه ۵GΩ افـزایش و بـا تغییرغلظـت محلـول از ۱۰ بـه ۱۵mM از ۵GΩ بـه ۵GΩ ۲۰/۴۷ GΩ بانت (شـکل ۴–۱۵(ب)). مشـاهده مـیشـود کـه M2 از بیشـترین مقـدار مقاومـت و M3 از کمتـرین مقـدار مقاومـت برخـوردار اسـت کـه مـیتوانـد ناشـی از تـراکم حامـلهـای ناشـی از تهـی جاهـای اکسـیژن باشد.



شکل۴–۱۵: (الف) نمودار I-V نمونههای مورد بررسی.(ب) نمودار تغییرات مقاومت الکتریکی بر حسب تغییرات غلظت محلول اسپری.

خواص اپتیکی شــکل ۴-۱۶ (الــف) و (ب) بترتیــب طیــفهــای عبــور و جــذب اپتیکــی لایــههــای مورد بررسی را نشان میدهد. نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که نمونه تهیه شده با بیشترین غلظت محلول اسپری دارای پایینترین میزان عبور و بالاترین میزان جذب است. این رفتار میتواند ناشی از ضخامت و همچنین تراکم حاملهای بار آزاد بالاتر در این نمونه باشد.



شکل ۴-۱۶: طیفهای (الف)عبور و(ب) جذب اپتیکی در لایههای مورد بررسی.

با استفاده از داده های طیف جذب (a) و با استفاده از رابطه (۲-۸) و با رسم منحنی²(ahu) برحسب hu و برونیابی داده ها در گستره خطی با محور افقی به ازایa=0 بزرگی گاف نواری مستقیم (Eg) تعیین میشود (شکل۴-۱۷(الف)). همانطور که مشاهده می شود تغییرات گاف نواری متناظر با تغییرات مقاومت الکتریکی نمونه ها است که خود تاییدی بر تاثیر تغییرات پهنای دنباله نواری بر کنترل مقدار گاف نواری در نمونه ها می باشد (شکل ۴-۱۷(ب)).



شکل۴–۱۷: (الف)تغییرات²(ahu) بر حسب انرژی فوتون ها در نمونههای مورد بررسی.(ب) تغییرات گاف نواری و مقاومت الکتریکی بر حسب غلظت محلول.

نتيجه گيرى

لایه های ناز ک با فاز خالص اکسید مولیبدن با استفاده از پیش ماده آمونیوم مولیبدات تترا هیدرات به روش اسپری پایرولیز در دمای C^oC^o در حجم محلول ۵۰m با غلظت محلول های ۵۰،۱، Mm ۵۱مختلف تهیه شدند. تصاویر FE-SEM نشان دهنده وابستگی مور فولوژی سطح نمونه ها به تغییرات غلظت محلول بوده و الگوی پراش XRD لایه ها حاکی از رشد بسبلوری در فاز راستگوشه در راستاهای بلوری (۲۰۰)، (۴۰۰) و (۴۰۰) می باشد. طیف رامان وجود فاز راست گوشه را تایید می کند. تحلیل داده های جذب اپتیکی لایه ها نشان داد که نمونه ای با بیشترین غلظت محلول دارای کمترین عبور و بیشترین رسانندگی و کمترین مقدار گاف نواری می باشد. نمونه های سنتز شده دارای گاف نواری اپتیکی در بازه پهنای دنباله نواری باشد.

در بخش بعد به تاثیر تغییرات دمای زیر لایه بر خواص فیزیکی نمونه R3 پرداختیم.

۴-۴ بررسی تاثیردمای زیرلایه بر خواص فیزیکی لایه های نازک اکسید مولیبدن

در این بخش به بررسی تاثیردمای زیرلایه بر خواص فیزیکی لایههای نازک اسید مولیبدن پرداختیم. محلول اسپری با غلظت ۱۸ ۰/۰ و آهنگ ۵ml/min بر روی زیرلایه شیشه در دماهای مختلف ۴۰۰،۳۵۰ و ⁰ ۴۵۰ به ترتیب T1، T2 (همان نمونه R3) و T3 انجام شد. در ادامه به بررسی نتایج مربوط به مورفولوژی سطح، خواص اپتیکی ،خواص ساختاری و الکتریکی این لایه میپردازیم. مور فولوژی سطح

بـرای بررسـی مورفولـوژی سـطح نمونـههـا، تصـاویر FE-SEM لایـههـا در مقیـاسهـای ۱µm و۲۰۳۳ تهیـه شـدند (شـکل۴-۱۸). همـانطـور کـه مشـاهده مـی-شـود نمونـه T1 شـامل سـطحی ریشـه ماننـد بـا دانـههـایی بـا ابعـاد کـوچکتر از ۱۵۰nm مـیباشـد. در نمونـه T2 سـطحی متخلخـل و برجسـته متشـکل از میلـههـایی بـا دانـههـایی بـر روی آنهـا بـا ابعـاد کـوچکتر از ۵۰nm و در T3 نـانو سـیمهـایی متخلخـل مـیبینـیم. همـانطـور کـه مشـاهده مـیشـود تـراکم حلقـههـا در نمونـه T3 نسـبت بـه



شکل۴–۱۸: تصاویر FE-SEM نمونههای مورد بررسی در دماهای زیرلایه ۳۵۰، ۴۰۰ وF۵۰⁰C به ترتیب نمونه های T2 ، T1.

خواص ساختاری

برای بررسی ویژگیهای ساختاری نمونهها از الگوی پراش پرتو ایکس(XRD) استفاده شده است(شکل ۴–۱۹). این دادهها ساختار بسبلوری اکسید مولیبدن با ساختار راست گوشه با صفحات اصلی (۲۲۰)، (۲۰۰) و (۲۰۰) را مطابق با شماره کارت JCPDS 35-0609 نشان میدهد که با دیگر گزاراشات مطابقت دارند[۲۰و۲۰].



، T1 شکل $^{+19}$:طیف XRD نمونههای مورد بررسی در دماهای زیرلایه ۳۵۰، ۴۰۰ و 0 ۴۵۰ به ترتیب نمونه های

T2و T3.

بـه منظـور بررسـی بیشـتر در خـواص سـاختاری نمونـههـا روابـط (۲-۲)، (۲–۳) و (۲-۴) بـرای تعیـین ابعـاد بلـورکهـا (D)، میکروکـرنشهـای بلـوری (٤) وتـراکم دررفتگـیهـا (δ) بـرای نمونـههـای سـنتز شـده اسـتفاده کـرده ایـم. جـداول (۴–۱۳)، (۴–۱۴) و(۴–۱۵) نتـایج بدسـت آمـده از ایـن تحلیـل را بـرای قلـههـای (۰۲۰)، (۴۰) و (۰۶۰) نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود در قلههای وابسته به جهت-گیریهای (۰۲۰)و(۰۴۰) اندازه بلورک در مقایسه با نمونه T2 افزایش یافته و میکرو کرنشها و چگالی درررفتگیها کاهش یافته اند.

جدول۴-۱۳: اندازه بلورکها،تراکم دررفتگیها و میکروکرنشهای بلوری برای قله ترجیحی (۰۲۰).

نمونه	D (nm)	δ ($\gamma \cdot \gamma nm^{-2}$)	^۲ ••۲)3
T_1	T9/1V	١/١٧	١/١٨
T ₂	26/04	1/41	١/٣٠
T ₃	T9/97	١/١١	1/10

جدول۴-۱۴: اندازه بلور کها،تراکم دررفتگیها و میکروکرنشهای بلوری برای قله (۰۴۰).

نمونه	D (nm)	δ ($\cdot \cdot \cdot nm^{-2}$)	۳-۳)3
T_1	78/18	١/٢٩	١/٢٩
T ₂	20/88	۱/۵۱	١/٣۴
T ₃	27/80	1/51	١/٢٠

جدول۴-10: اندازه بلور کها،تراکم دررفتگیها و میکروکرنشهای بلوری برای قله (۰۶۰).

نمونه	D(nm)	δ (\cdot - nm^{-2})	^۳ -۱)3
T_1	۲۷/۱۹	١/٣۵	١/٢٧
T ₂	78/88	١/۴٠	١/٣٠
T ₃	۲۹/۹۲	١/١١	1/10

جـدول (۴–۱۶) ضـریب بافت(رابطـه ۲–۵) را بـرای سـه قلـه اصـلی (۲۰۰)، (۱۴۰) و (۱۶۰) نشـان مـیدهـد. مقـدار ضـریب بافـت در هـر سـه نمونـه در درراسـتای (۱۲۰) نسـبت بـه سـایر راسـتاها بیشـتر اسـت کـه نشـان دهنـده راسـتای ترجیحـی در ساختار بلوری لایهها میباشد.

نمونه	TC ₀₂₀	TC ₀₄₀	TC ₀₆₀
T1	1/41	1/11	•/۴٨
T2	1/41	١/•٨	•/۴٩
T3	1/53	1/17	٠/۵٩

جدول۴-۱۶ : ضریب بافت برای سه قله اصلی(۲۰)، (۰۴۰) و (۰۶۰).

شـکل^۴-۲۰ طیـف رامـان نمونـههـای مـورد بررسـی را نشـان مـیدهـد. همـان-طـور کـه مشـاهده مـیشـود بـا افـزایش دمـای زیرلایـه شـدت قلـههـای رامـان افـزایش یافتـــهانـــد. قلـــههـای ۲۹۵/۲، ۱۵۷/۲، ۲۸۳/۴ ، ۸۹۵/۸ و^{۱-} ۹۹۵cm مربـــوط بـهدت مارتینز و همکـاران [۲۲] و همچنــین کامونـا و همکـاران [۲۲] مطابقــت دارنــد. نــواحی محـدود بــه ¹⁻ ۴۰۰۲ و ¹⁻ ۲۰۰ محـدود بــه ¹⁻ ۲۰۰۲ و ¹⁻ ۲۰۰ محـدود بــه ¹⁻ مطابقــت دارنــد. نــواحی محـدود بــه ¹⁻ ۲۰۰۲ و ¹⁻ ۲۰۰ محـدود بــه ¹⁻ ۲۰۰۲ و ¹⁻ ۲۰۰ محـدود بــه ¹⁻ مطابقــت دارنـد. نــواحی محـدود بــه ¹⁻ ۶۰۰۲ و ¹⁻ ۲۰۰ محـدود بــه ¹⁻ ۲۰۰۲ و ¹⁻ ۲۰۰ محـدود بــه محـد دارنـد. محـدود بــه ¹⁻ ۲۰۰۳ و ¹⁻ ۲۰۰ محـدود بــه ¹⁻ ۲۰۰۳ و ¹⁻ ۲۰۰ محـدود بــه ¹⁻ ۲۰۰ محـدود بــه ¹⁻ ۲۰۰۳ و ¹⁻ ۲۰۰ محـدود بــه ¹⁻ ۲۰۰۳ مربوط بــه مــد کشـــی پیونـــد ۲۸۰ محـدود بــه ¹⁻ ۲۸۳/۴، ۲۵۷/۱۰ مربـوط است. قلـه هـای کوتـاهتر رامـان شـامل ۲۸۷/۱۰ مربـروط اســه مـد کشـــی و مــه مـد کشــی O-Mo مربـوط اسـت. قلــه هـای کوتـاهتر رامـان شـامل ۲۵/۱۰ مربــرو



شکل۴-۲۰:تصویر رامان در نمونههای مورد بررسی در دماهای زیرلایه ۳۵۰، ۳۵۰ و۴۵۰⁰C به ترتیب نمونه های T1، T2و T3.

خواص الكتريكى

شــکل۴–۲۱ نمـودار جریـان-ولتـاژ(I-V) نمونـهها را در بـازه ۱/۵۷تـا ۱/۵۷– نشـان مــىدهـد. ایــن نتـایج نشـان دهنـده رفتـار اهمــى اتصـالات در ایــن نمونـههـا مــىباشـد. مقاومــت الکتریکـــى نمونــههـا بــه ترتیــب برابــر مقـادیر ۲۱/۰، ۵ و ۲۵۰GΩ اســت. مشـاهده مــىشـود کـه بـا افـزایش دمـاى زیرلایـه مقاومـت نمونـههـا بـه طـور قابـل تـوجهى افــزایش یافتـه اسـت (شـکل ۴–۲۱-ب). ایــن تغییـرات مــىتوانـد منجــر بـه کـاهش ترازهـاى وابسـته بـه تهـى جاهـاى اکسـیژن و در نتیجـه کـاهش پهنـاى دنبالـه نوارى با افزایش دماى زیرلایه باشد.



شکل۴–۲۱: (الف) مشخصه I-V نمونههای مورد بررسی در دماهای زیرلایه ۳۵۰، ۴۵۰ وF۵۰⁰C به ترتیب نمونه های T1، ۲۲و T3 (ب) نمودار تغییرات مقاومت الکتریکی بر حسب تغییرات دمای زیر لایه.

خواص اپتيكى

شـکل ۴–۲۲ (الـف) و (ب) بترتیـب طیـف عبـور و جـذب اپتیکـی لایـههـای مـورد بررسـی را نشـان مـیدهـد. نتـایج بدسـت آمـده نشـان دهنـده آن اسـت کـه نمونـهای کـه در دمـای زیرلایـه بـالاتر تهیـه شـده دارای عبـور بیشـتر وجـذب پـایینتـر و نمونـه ای کـه در پـایینتـرین دمـای زیرلایـه فـراهم شـده کمتـرین میـزان عبـور و بـالاترین میـزان جـذب را دارد. ایـن تغییـرات مـیتوانـد ناشـی از افـزایش خاصـیت فلزگـونی نسـبی در این نمونه ها که منجر به افزایش بازتاب نور در این لایه ها میگردد باشد.



شکل ۴-۲۲: طیفهای (الف)عبور و(ب) جذب اپتیکی در لایههای مورد بررسی در دماهای زیرلایه ۳۵۰، ۴۰۰ شکل ۴-۲۲: طیفهای (T1 و T2 و ۳۵۰ به ترتیب نمونه های T1، T2 و T3.

بـــا اســــتفاده از دادههــای طیــف جــذب (a) و رابطــه (۲-۷) و بــا رســم منحنـی²(ahv) بـر حسـب hv و بـرون یـابی دادهها در گسـتره خطـی بـا محـور افقـی بـه ازای a=0 بزرگـی گـاف نـواری مســتقیم (Eg) تعیـین مــیشود(شـکل۴-۲۳). نتـایج ایـن تحلیـل نشـان مـی دهـد کـه بـا افـزایش دمـای زیرلایـه تغییـرات gB سـیری صـعودی دارد (بـه ترتیـب ۲/۹۲، ۲/۹۶ و ۳/۵۶۳ و ۳/۶۳۷). ایـن تغییـرات مــیتوانـد متـاثر از تغییـرات پهنای دنباله نواری باشد.



شکل۴-۲۳: تغییرات² (ahu) بر حسب انرژی فوتونها در نمونههای مورد بررسی در دماهای زیرلایه ۳۵۰، ۴۰۰ شکل۴-۲۳: تغییرات² (ahu) و ۴۵۰⁰C به ترتیب نمونه های T1، T2 و

نتيجه گيرى

لایههای نازک با فاز خالص اکسید مولیبدن با استفاده از پیش ماده آمونیوم مولیبدات تترا هیدرات به روش اسپری پایرولیز با غلظت M ۰/۰۱ در حجم ۵۰۳۱ برروی زیرلایه شیشه با آهنگ ۵ml/min دردماهای ۲۵۰ ، ۳۵۰ و^Cو ۴۵۰⁰ تهیه شدند. تصاویر FE-SEM وابستگی مورفولوژی سطح به دمای زیر لایه را نشان میدهند به طوری که با افزایش دمای زیرلایه شاهد تشکیل دانه، نانو میله و نانو سیم هستیم. طیف XRD لایهها حاکی از رشد بسبلوری در فاز راست گوشه در راستاهای بلوری (۲۰۰)، (۰۴۰) و (۰۶۰) میباشد. طیف رامان وجود فاز راست گوشه را تایید میکند. تحلیل دادههای الکتریکی نشان داد که افزایش دمای زیرلایه افزایش قابل توجهی بر مقاومت الکتریکی نمونه دارد. تحلیل دادههای اپتیکی لایهها نشان داد که نمونههای تهیه شده دارای گاف نواری اپتیکی در بازه ۷۶ تشان داد که افزایش دمای زیرلایه افزایش قابل توجهی بر مقاومت الکتریکی نمونه دارد. تحلیل دادههای مقدار رسانش و نمونه تهیه شده در پایین ترین دمای زیرلایه دارای کوچکترین گاف نواری و کمترین مقدار رسانش و نمونه تهیه شده در پایین ترین دمای زیرلایه دارای کوچکترین گاف نواری و بیشترین مقدار رسانش است که خود تاییدی بر تاثیر تغییرات پهنای دنباله نواری بر مقدار گاف نواری و بیشترین

نتیجه گیری کلی

در این پایان نامه به سنتز و بررسی مورفولوژی، خواص ساختاری، الکتریکی و نوری لایههای نازک اکسید مولیبدن به روش اسپری پایرولیز پرداخته شده است. لایهها بر روی زیرلایه شیشه با پیش ماده آمونیوم مولیبدات تترا هیدرات در حجم ۵۰ml فراهم شدند. نمونههای اکسید مولیبدن در سه آهنگ لایه نشانی ۱/۵، ۲/۵ و ml/min ۵ فراهم شدند. سپس نمونه فراهم شده در آهنگ ۵ml/min به عنوان نمونه ای که بلورینگی برتر داشت انتخاب شده و سایر نمونهها بر اساس این نمونه با متغیرهای روش اسپری شامل شیوه اسپری، غلظت محلول و دمای زیرلایه مورد بررسی قرار گرفتند.

در این تحقیق با تغییرات مختلف در شرایط لایه نشانی به این نتیجه رسیدیم که تغییر در شیوه اسپری به رشد بهترین لایه اکسید مولیبدن از لحاظ بلورینگی منجر می شود.

ییشنهادات

- مطالعه تاثیر سایرزیرلایهها (نظیر Si، کوارتز و...) و همچنین تغییرات حجم محلول بر خواص فیزیکی لایههای نازک اکسید مولیبدن تهیه شده به روش اسپری پایرولیز
 - مطالعه اثر ناخالصي بر لايههاي نازك اكسيد موليبدن
- بررسی روشهای مختلف (کندوپاش، سل-ژل،...) بر خواص فیزیک لایههای نازک اکسید مولیبدن
- بررسی خواص حسگرگازی و نوری، الکتروکرومیک و همچنین بررسی به کارگیری این لایهها
 در سلول های خورشیدی

فهرست منابع

[1] <u>http://edu.nano.ir/paper/595</u>

- Bréchignac C, Houdy P, and Lahmani M ,(2008)," Nanomaterials and nanochemistry", Springer Science & Business Media.
- [3] فرزاد حسینی نسب، محسن افسری ولایتی، سید معصومه قاسمینژاد لیچانی،(۱۳۹۲)، "**آشنایی با علوم و** فناوری نانو"، جلد اول، انتشارات کوچک آموز، تهران.
- [4] Edelstein .A. S and Cammaratra .R, *Nanomaterials*, (1998), " synthesis, properties and applications", **CRC press**.
- [5] Owens F. J and Poole Jr C. P, (2008),"The physics and chemistry of nanosolids", John Wiley & Sons.
- [6] Ohno K, Tanaka M, Takeda,J and Kawazoe Y, (2008)," Nano-and micromaterials" **Springer,9**.
- [7] Mahajan S, Mujawar S, Shinde P, Inamdar A, and Patil P ,(2008), "Structural, optical and electrochromic properties of Nb-doped MoO₃ thin films," Applied Surface Science, 254, pp. 58595 -5895.
- [8] Mane A, Suryawanshi M, Kim J, and Moholkar A,(2016), "Highly selective and sensitive response of 30.5% of sprayed molybdenum trioxide (MoO₃) nanobelts for nitrogen dioxide (NO2) gas detection", Journal of colloid and interface science,483 ,pp. 220-231.
- [9] Boukhachem A, Mokhtari M, Benameur N, Ziouche A, Martínez M, Petkova P, ,(2017), "Structural optical magnetic properties of Co doped α-MoO₃ sprayed thin films," Sensors and Actuators A: Physical, 253, pp. 198-209.
- [10] Uthanna S, Nirupama V, and Pierson J,(2010), "Substrate temperature influenced structural, electrical and optical properties of dc magnetron spttered MoO₃ films," Applied Surface Science, 256, pp. 3133-3137.
- [11] Aoki T, Matsushita T, Mishiro K, Suzuki A, and Okuda M,(2008) "Optical recording characteristics of molybdenum oxide films prepared by pulsed laser deposition method," Thin Solid Films, 517, pp. 1482-1486.
- [12] Zhang Y, Yuan J, Cao Y, Song L, and Hu X ,(2008), "Photochromic behavior of Listabilized MoO3 sol–gels", Journal of Non-crystalline solids, 354, pp. 1276-1280.

- [13] Ivanova T, Gesheva K, and Szekeres A, (2002),"Structure and optical properties of CVD molybdenum oxide films for electrochromic application," Journal of Solid State Electrochemistry,7, pp. 21-24.
- [14] Chithambararaj A, Rajeswari Yogamalar N, and Bose A.C , (2016), "Hydrothermally synthesized h-MoO₃ and α -MoO₃ nanocrystals: new findings on crystal-structure-dependent charge transport," Crystal Growth & Design, 16, pp. 1984-1995.
- [15] Lee S.H, Seong M.J, Tracy C.E, Mascrarenhas A, Pitts J.R, Deb S.K, (2002)," Raman spectroscopic studies of electrochromic a-MoO3 thin films", Solid State, 147, pp.129-133.
- [16] <u>https://en.wikipedia.org/wiki/Molybdenum_trioxide</u>
- [17] Martínez H, Torres J, Carreño L.L , and Rodríguez-García M,(2013), "Effect of the substrate temperature on the physical properties of molybdenum tri-oxide thin films obtained through the spray pyrolysis technique," Materials Characterization, 75, pp. 184-193.
- [18] Seguin L, Figlarz M, Cavagnat R, and Lassègues J. C ,(1995), "Infrared and Raman spectra of MoO3 molybdenum trioxides and MoO3 · xH2O molybdenum trioxide hydrates," Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 51, pp. 1323-1344.
- [19] Haro-Poniatowski E, Jouanne M, Morhange J, Julien C, Diamant R, Fernandez-Guasti M ,(1998), "Micro-Raman characterization of WO3 and MoO3 thin films obtained by pulsed laser irradiation," Applied surface science, 127, pp. 674-678.
- [20] Martínez H, Torres j, Rodríguez-García M, and Carreño L. L ,(2012), "Gas sensing properties of nanostructured MoO3 thin films prepared by spray pyrolysis," Physica B : Condensed Matter, 407, pp. 3199-3202.
- [21] Mahajan S, Mujawar S, Shinde P, Inamdar A, and Patil P,(2008), "Concentration dependent structural, optical and electrochromic properties of MoO₃ thin films," Int. J. Electrochem. Sci, 3, pp. 953.
- [22] https://tamadkala.com
- [23] M. Gopal, W. M. Chan, and L. De Jonghe,(1997), "Room temperature synthesis of crystalline metal oxides", Journal of Materials Science, 32, pp. 6001-6008.
- [24] Kamouna O, Boukhachema A, Amlouka M and Ammarb S ,(2016), "Physical study of Eu doped MoO3 thin films", Journal of Alloys and Compounds, 687, pp. 595-603.

- [25] Sawaby A, Selim M. S, Marzouk S.Y, Mostafa M.A, and Hosny A ,(2010), "Structure, optical and electrochromic properties of NiO thin films," Physica B: Condensed Matter, 405, pp. 412-3420.
- [26] Alver U, Kılınç T, Bacaksız E, Küçükömeroğlu T, Nezir S, Mutlu İ.H , Aslan F, (2007)
 "Synthesis and characterization of spray pyrolysis Zinc Oxide microrods", Thin Solid
 Films. 515 ,pp 3448-3451.
- [27] Prasada Rao T, Santhoshkumar M.C, (2009), "Effect of thickness on structural, optical and electrical properties of nanostructured ZnO thin films by spray pyrolysis", Applied Surface Science. 255, 4579–4584.
- [28] Holler, F.J., Skoog D.A, and Crouch S.R ,(2007), "Principles of instrumental analysis". **Belmont: Thomson**.
- [29] Dragnea B,(2004)," Near-Field Scanning Optical Microscopy", Chemical Imaging, in Dekker Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, Taylor & Francis. pp. 2703-2712.
- [30] Ohno, T., Suzuki D, and Ida T,(2004), "Size effect for barium titanate nano-particles", KONA Powder and Particle Journal,22, pp195-2

Abstract

In this research we synthesized and studied the surface morphology, structural, electrical and optical properties of molybdenum oxide MoO₃ thin films prepared by spray pyrolysis method on glass substrate. For physical characterization of the samples we used field emission scanning electron microscope (FESEM), X-ray diffraction (XRD), optical spectroscopy (UV-Vis.) and current-voltage (I-V) measurement.

In the first step molybdenum oxide thin films were deposited with different spray rates of 1.5, 2.5 and 5 ml/min. It is found that compared to other samples, the one with the deposition rate of 5 ml/min has a better crystallinity. In order to improve this characteristic we investigated the effect of other deposition conditions including: modification in the spray route (section 4-2-1), concentration of the precursor (section 4-3), and finally the substrate temperature (Section 4-4).

In this study, we found that changing in substrate temperature lead to the optimum condition, from crystallinity point of view, for the MoO₃ layer.

Keywords: Molybdenum oxide (MoO₃), Spray pyrolysis, Thin film, Nanostructure, Morphology, Structural properties, Optical properties, Electrical properties



Shahrood University of Technology Faculty of Physics and Nuclear Engineering M.Sc. Thesis in Solid State Physics

Title of thesis: growth and characterization of molybdenum oxide (MoO₃) thin film

By: MaryaamJalal

Supervisor:

Dr Hosein Eshghi

July 2018